PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-172003

(43) Date of publication of application: 29.06.1999

(51)Int.CI.

CO8G 77/448 CO8G 64/42 CO8G 77/60 G03G 5/05 // CO8G 64/04

(21)Application number: 09-343057

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

12.12.1997

(72)Inventor: HIKOSAKA TAKAAKI

(54) PRODUCTION OF CROSSLINKED POLYCARBONATE RESIN, CROSSLINKED POLYCARBONATE RESIN AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a crosslinked polycarbonate resin which can give a molding excellent in optical properties and mechanical properties, especially, abrasion resistance by hydrosilylating a carbon-carbon-unsaturation-carrying polycarbonate resin by reaction with a silicone compound having at least two silicon-hydrogen bonds in the molecule in the presence of a catalyst.

--{a- Ar²-o-ç-}-Π

-{o-Ar1-o-g}-

SOLUTION: The carbon-carbon-unsaturation-carrying polycarbonate used is one comprising repeating units of formula I or comprising repeating units of formula I and repeating units of formula II. In formula I, Ar1 is, for example, a divalent group represented by formula III. In formula III, X1 is a single bond,- O-, -S- or the like; A is a group of -(CH2)h- or the like; h is an integer of 0-6; FG is ethynyl or vinyl; p1 and p2 are each an integer of 0-4; R1 is a hydrogen atom, a 1-12C alkyl or the like. In formula II, Ar2 is, for example, a group of formula IV (wherein X2 is X1; R6 is R1;

and r is an integer of 0-4). The catalyst used is a transition metal

catalyst, a basic catalyst, or a radical chemical species.

$$(R^6)_r$$
 $(R^6)_r$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公頁番号

特開平11-172003

(43)公開日 平成11年(1999)6月29日

| (51) Int.Cl.* | | 識別配号 | FI |
|---------------|-------|------------------|----------------------------|
| C08G 7 | 7/448 | | C 0 8 G 77/448 |
| 6 | 4/42 | | 64/42 |
| 7 | 7/60 | | 77/60 |
| G03G | 5/05 | 101 | G 0 3 G 5/05 1 0 1 |
| # C08G 6 | 4/04 | | C 0 8 G 64/04 |
| | | | 客企論水 未請求 請求項の数6 OL (全97 頁) |
| (21)出度番号 | | 特度平9-343057 | (71)出額人 000183646 |
| | | | 出光興産株式会社 |
| (22)出度日 | | 平成9年(1997)12月12日 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 |
| | | | (72) 発明者 彦坂 高明 |
| | | | 千秦原袖ケ浦市上泉1280番地 |
| | | | (74)代理人 弁理士 京平 正道 |
| | | | |
| | | | |
| | | | · |
| | | | |
| | | | |
| | • | | |
| | | • | |

(54) 【発明の名称】 架橋ポリカーポネート樹脂の製造法および架構ポリカーポネート樹脂ならびに電子写真成光体

(57)【要約】

【課題】 電気・電子機器、光学機器などの分野で有用性の高い架橋ボリカーボネート樹脂の製造に際し、架橋工程においてボリカーボネート樹脂の性能低下を招かない効果的な架橋を行い、殊に耐摩託性に優れた成形体を得ることのできる架橋ボリカーボネート樹脂の製造方法と、その製法によって得られた架橋ボリカーボネート樹脂、並びにこの架橋ボリカーボネート樹脂を用いた耐外性に優れた電子写真感光体を提供する。

【解決手段】 炭素一炭素不飽和結合を有するボリカーボネート樹脂を、分子内に珪素-水素結合を2つ以上持つ珪素化合物によりヒドロシリル化する架橋ボリカーボネート樹脂の製造方法、及び該方法により得られる架橋ボリカーボネート樹脂を含有する感光層を導電性基体上に設けてなる電子写真感光体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート樹脂を、遷移金属駐媒、塩基系触媒およびラジカル化学種から選択される1種または2種以上の物質の存在下に、同一分子内に珪素-水素結合を2つ以上持つ珪素化合物と反応させてヒドロシリル化することを特徴とする架橋ポリカーボネート樹脂の製造方法。

【請求項2】 前配炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート樹脂が、下配の一般式[1]で要される繰返し単位(1)、または一般式[1]で表される繰返し単位(1) および一般式[2]で表される繰返し単位

(2)を有するポリカーボネート樹脂である請求項1記 載の架構ポリカーボネート樹脂の製造方法。

【化1】

$$\frac{-(\circ - Ar^1 - \circ - \frac{\circ}{6})}{(\circ - Ar^2 - \circ - \frac{\circ}{6})} \qquad [1]$$

[式 [1] 中、Ar¹ は、 【化2】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^{1} \\
 & C \\
 & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & R^{2} \\
 & C
\end{array}$$

$$(CH_{2h} \xrightarrow{\begin{pmatrix} R^{1} \\ \vdots \\ R^{1} \end{pmatrix}} (CH_{2h} \xrightarrow{\begin{pmatrix} R^{1} \\ \vdots \\ R^{1} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} R^{1} \\ \vdots \\ R^{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} R^{1} \\ \vdots \\ R^{1} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} CH_{2h} \\ \vdots \\ R^{1} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & g \end{bmatrix}$$

$$-(CH2)t + \begin{pmatrix} R5 \\ 1 \\ Si - O \end{pmatrix} - Si - (CH2)t - (CH2)t - [3]$$

(式[3] 中のR⁵ は、各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ドリフルオロメチル基、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12の関換もしくは無置換のアリール基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12の 置換もしくは無置換のアリールオキシ基であり、 t は0~6の整数である) で表される基であり、式[1a]~[1c]中のAは、一(CH₂)_b一、一COO一(CH₂)_b一、一COO一(CH₂)_b一、一COO一(CH₂)_b一、一COO一(CH₂)_b一で表される基(ただしhは0~6の整数であ

る)であり、FGは、エチニル基またはビニル基であり、p¹、p²は0~4の整数(ただしp¹÷p²は1~8の整数である)であり、qは1または2であり、sは1~6の整数であり、式 [1 d]中のYは少なくとも1つの炭索ー炭素不飽和結合を持つ炭素数2~12の炭 状または環状の炭化水素基を重換基として有する炭素数5~12のシクロアルキリデン基であり、式 [1 a]~[1 g]中のR¹は、水素原子、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、炭素数1~12のアルキル基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12の置換もしくは

無置換のアリールオキシ基であり、 R^2 は R^1 と同一の基であるが R^2 同士が炭素数 $1\sim 10$ のの炭化水素基で結合されていてもよく、式 $\left\{1\,e\right\}$ 中の e は 1 であり、式 $\left\{1\,f\right\}$ $\left\{1\,g\right\}$ 中の e は $1\sim 200$ の整数であり、式 1 がつ $1\sim 200$ の整数であり、1 は各々独立に $1\sim 200$ の整数であり、 $1\sim 200$ の

10 【化4】

$$(R^{5})_{r} \qquad (R^{5})_{r} \qquad [2 a]$$

$$(R^{5})_{k} \qquad [2 b]$$

$$(R^{5})_{k} \qquad [2 b]$$

$$(R^{5})_{r} \qquad [2 c]$$

$$(R^{5})_{r} \qquad (CH_{2})_{1} \qquad [2 d]$$

(式 [2a] ~ [2d] 中の X^1 、 R^6 、r 、t 、g は、前記 X^1 、 R^1 、r 、t 、g と同じ意味を有し、k は0 ~6 の整数である)で表される基である。〕

【請求項3】 前記同一分子内に珪紫-水素結合を2つ

以上持つ珪素化合物が、下配一般式〔4 a〕~〔4 f〕 で表される化合物である請求項1または2記載の架橋ポリカーポネートの製造方法。

【化5】

[式 [4 a] ~ [4 f] 中のR⁷ は、前記R¹ と同じ意 so 味を有し、iは0~200の整数であり、nは2~10

0の登数でかつn+mが2~200の登数であり、u+ vが0~200の整数であり、wは0~6の整数であ ·

【請求項4】 前記遷移金属性媒が、鉄触媒、ルテニウ ム触媒、コバルト触媒、ロジウム触媒、イリジウム触 媒、ニッケル性媒、パラジウム触媒および白金触媒から 選択される1種または2種以上の触媒である請求項1~ 3のいずれかに記載の架橋ボリカーボネートの製造方

【請求項5】 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカー ポネート樹脂を、遷移金属鮭媒、塩基系触媒およびラジ カル化学種から選択される1種または2種以上の物質の 存在下に、同一分子内に珪索-水素結合を2つ以上持つ 珪素化合物と反応させてヒドロシリル化してなる架構ポ リカーボネート樹脂。

【請求項6】 導電性基体上に少なくとも感光層を有す る電子写真感光体において、該感光層に請求項 5 記載の 架橋ポリカーボネート樹脂を含有していることを特徴と する電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、機械的性質や光学 的性質、電子写真特性に優れた架橋ポリカーボネート樹 脂を製造する方法、およびその方法で製造された架橋ボ リカーボネート樹脂に関するものである。また、本発明 は、この架橋ポリカーポネート樹脂を感光層中のパイン ダー樹脂として含有する耐久性に優れた電子写真感光体 に関するものである。

[0002]

熱的性質、電気的性質に優れていることから、様々な産 業分野において成形品の素材に用いられてきた。近年、 さらにこのポリカーボネート樹脂の光学的性質などをも 併せて利用した機能的な製品の分野においても多用され ている。このような用途分野の拡大に伴って、ポリカー ボネート樹脂に対する要求性能も多様化している。この ような要請に応えるためには、従来から用いられてきた 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンや 1、1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサ ンなどを原料とするポリカーボネート樹脂のみでは充分 40 な対応ができないことがあることから、様々な化学構造 を有するポリカーボネート樹脂が提案されてきている。 しかしながら、各種の用途毎に特有の要求特性があるこ とから、それら要請を満足する性能を具備するポリカー ボネート樹脂の開発が求められている。

【0003】このような機能的な製品として、ポリカー ポネート樹脂を有機電荷発生材料や電荷輸送材料用のパ インダー樹脂とする感光層を導電性基体上に形成した有 機電子写真感光体がある。この電子写真感光体として は、従来、セレンやαーシリコンなどの無機光導電性材 so 飽和結合を有するポリカーボネート樹脂に、分子内に 2

料を用いたものが使用されていたが、最近では、前配有 機電子写真感光体の性能が向上したことから、その使用 割合が拡大している。

【0004】この有機電子写真感光体には、適用される 電子写真プロセスに応じて、所定の感度や電気特性、光 学特性を備えていることが要求される。この電子写真感 光体は、その感光層の表面に、コロナ帯電、トナー現 像、紙への転写、クリーニング処理などの操作が繰返し 行われるため、これら操作を行う度に電気的、機械的な 外力が加えられる。したがって、長期間にわたって電子 写真の面質を維持するためには、電子写真感光体の衰面 に設けた感光層に、これら外力に対する耐久性が要求さ

【0005】このような要請に応えるため、有機電子写 真感光体のパインダー樹脂としては、感光層に用いる電 荷輸送物質との相溶性がよく光学特性も良好なポリカー ボネート樹脂が使用されてきた。しかしながら、従来、 このポリカーボネート樹脂として、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル) プロパンや、2,2-ピス(4-20 ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンなどを原料とする ものが使用されてきたが、耐久性の点で充分に満足でき なかった。このようなことから、例えば特開平4-29 1348号公銀では、バインダー街脂として炭素ー炭素 不飽和結合を有する架橋性のポリカーボネート樹脂を用 い、これを含む感光層を導電性基体に塗布した後に、咳 架橋性ポリカーボネート樹脂を架橋させた電子写真感光 体が提案されている。ところで、この場合、該架橋住が リカーボネート樹脂にラジカル開始剤を加えて架構反応 を行うので、ここで発生したラジカルにより、ポリカー 【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は、機械的性質や 30 ボネート樹脂の分子鎖が切断を受けたり、化学変化を受 けて黄変することがあるという問題がある。また、ここ で発生したラジカルにより、このパインダー樹脂に含有 させてある電荷輸送物質が化学変化を受けて、その性能 の低下を招くという問題もある。したがって、これら分 子切断や化学変化に伴う電子写真感光体の性能や耐久性 の低下のため、充分に満足できるには至っていなかっ

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の事情 に基づいてなされてものであり、光学的性質や機械的性 **電、ことに耐摩耗性に優れた成形品を得ることのできる** 架橋ポリカーボネート樹脂とその製造方法を提供するこ とを目的とするものである。さらに、この架橋ポリカー ボネート樹脂を有機電子写真感光体用のパインダー樹脂 として用いた耐久性に優れた電子写真感光体を提供する ことを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記課題を 解決するために、鋭意研究を重ねた結果、炭素一炭素不 つ以上の珪素-水素結合を有する珪素化合物を反応させ ヒドロシリル化した架橋ポリカーボネート樹脂が、光学 的性質や機械的性質、ことに耐摩耗性に優れたものであ ることを見出した。さらに、この架橋ポリカーボネート 樹脂を有機電子写真感光体月のパインダー樹脂に用いる と、耐久性に優れた電子写真感光体が得られることを見 出し、これら知見に基づいて本発明を完成するに至っ

【0008】すなわち、本発明の要旨は、下配のとおりである。

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂を、遷移金属触媒、塩基系触媒およびラジカル化学 種から選択される1種または2種以上の物質の存在下 に、同一分子内に珪素-水素結合を2つ以上持つ珪素化 合物と反応させてヒドロシリル化することを特徴とする 架機ポリカーボネート樹脂の製造方法。 (2) 前配炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート樹脂が、下配の一般式 [1] で表される繰返し単位

(1)、または一般式[1]で安される繰返し単位

(1) および一般式 [2] で衰される繰返し単位 (2) を有するポリカーボネート樹脂である上配 (1) 記載の 架橋ポリカーボネート樹脂の製造方法。

[0009]

【化6】

$$\frac{-(o-Ar^1-o-g)}{-(o-Ar^2-o-g)} \quad [1]$$

【0010】 [式 [1] 中、Ar¹ は、 【0011】 【ル7】

 $(CH_2)_{l} \leftarrow \begin{pmatrix} R^1 \\ S^1 - O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^1 \\ R^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ R^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ R^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ R^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^1 \\ R^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix}$

【0012】(式〔1 a〕中のX¹ は、単結合、一〇一、一CO一、一S一、一SO-、一SO2 一、一CR ³ R⁴ ー (ただし、R³ 、R⁴ は各々独立に水奈原子、 炭素数1~12のアルキル基、トリフルオロメチル基または炭索数6~12の恒換もしくは無置換のアリール基である)、炭素数5~12の置換もしくは無置換のシクロアルキリデン基、炭素数2~12の置換もしくは無置換のα, ωーアルキレン基、9, 9ーフルオレニリデン 50 基、1,8-メンタンジイル基、2,8-メンタンジイル基、置換もしくは無置換のピラジリデン基、炭素数6~12の置換もしくは無置換のアリーレン基金たは下記一般式[3]、

[0013]

【化8】

$$-(CH2)1 \leftarrow \begin{pmatrix} R5 \\ S - O \\ R5 \\ R5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R5 \\ S - (CH2)1 - (CH2)2 - (CH2)3 - (CH2)4 - (CH2)5 - (CH2)$$

【0014】(式[3]中のR⁵ は、各々独立に水素原子、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、炭素数1~12のアルキル基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12の置換もしくは無置換のアリールオキシ基であり、たは0~6の整数である)で表される基であり、式[1a]~[1c]中のAは、一(CH2) h一、一COO一(CH2) h一、一COO一(CH2) h一、一COO一(CH2) h一、一COO型数である)であり、FGは、エチニル基またはビニル基であり、p¹、p²は0~4の整数(ただしp¹÷p²は1~8の整数である)であり、qは1または2であり、sは1~6の整数であり、式[1d]中のYは少なくとも1つの炭素一炭素不飽和結合を持つ炭素数2~1

2の負状または選状の炭化水素基を置換基として有する 炭素数5~12のシクロアルキリデン基であり、式[1 a]~[1g]中のR¹は、水素原子、ハロゲン原子、 トリフルオロメチル基、炭素数1~12のアルキル基、 炭素数6~12の置換もしくは無置換のアリール基、炭 素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12の置換も しくは無置換のアリールオキシ基であり、R²はR¹と 同一の基であるがR²同士が炭素数1~10の炭化水素 基で結合されていてもよく、式[1e]中のcは0cまた は1であり、式[1f][1g]中のeは1~200の 整数であり、かつd+eの合計が1~200の整数であり、 rは各々独立に0~4の整数であり、tは各々独立 に0~6の整数であり、gは0~200の整数である) で表される二価の基であり、一般式[2]中のAr 2は、

10

[0015] [(129]

【0016】(式 $\{2a\}$ ~ $\{2d\}$ 中の X^2 、 R^6 、r、t、gは、前配 X^1 、 R^1 、r、t、gと同じ意味を有し、kは0~ $\{60$ 整数である)で安される基である。)

(3) 前記同一分子内に珪紫-水索結合を2つ以上持つ

珪素化合物が、下配一般式 $[4a] \sim [4f]$ で表されるものである上配 (1) または (2) 配敷の架橋ポリカーボネートの製造方法。

.【0017】 【化10】

$$H \leftarrow \begin{bmatrix} R' \\ I \\ Si - O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R' \\ I \\ Si - H \\ I \\ S' \end{bmatrix}$$
 [4 b]

$${}^{7}R = \left(\begin{array}{c} R^{7} \\ \vdots \\ S^{i} - O \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} R^{7} \\ \vdots \\ S^{i} - O \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} R^{7} \\ \vdots \\ S^{i} - R^{7} \end{array}\right) = \left[\begin{array}{c} 4 \text{ c} \end{array}\right]$$

$$H = \begin{pmatrix} R^7 & & & R^7 \\ I & -N & & S \\ S_1 & N & & I \\ I_{p_7} & H & & I_{p_7} \end{pmatrix}$$
 [4 \text{ } \text{ }

$$H \leftarrow \begin{pmatrix} R^{2} \\ I \\ Si - O \\ I \\ R^{2} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} R^{2} \\ I \\ Si - O \\ I \\ R^{2} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} R^{2} \\ I \\ Si - O \\ I \\ R^{2} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} R^{2} \\ I \\ Si - O \\ I \\ R^{2} \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 4 & f \end{bmatrix}$$

【0018】 [式 [4a] ~ [4f] 中のR' は、前記 R!と同じ意味を有し、iは0~200の整数であり、 nは2~100の整数でかつn+mが2~200の整数 であり、u+vが0~200の整数であり、wは0~6 の整数である。)

- (4) 前配基移金属触媒が、鉄触媒、ルテニウム触媒、 コパルト触媒、ロジウム触媒、イリジウム触媒、ニッケ ル触媒、パラジウム触媒および白金触媒から選択される 1種または2種以上の触媒である上記(1)~(3)の いずれかに記載の架橋ポリカーポネートの製造方法。
- (5) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂を、遷移金属触媒、塩基系触媒およびラジカル化学 種から選択される1種または2種以上の物質の存在下 に、同一分子内に珪素-水素結合を2つ以上持つ珪素化 合物を反応させてヒドロシリル化してなる架橋ポリカー ポネート樹脂。
- (6) 導電性基体上に少なくとも感光層を有する電子写 真感光体において、該感光層に上記(5)記載の架橋ポ 子写真感光体。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の架橋ポリカーボネート樹 脂は、炭素一炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂に、同一分子内に珪素-水業結合を2つ以上持つ珪 素化合物を反応させることによって製造することができ る。ここで用いる炭素ー炭素不飽和結合を有するポリカ ーポネート樹脂としては、ポリカーポネート樹脂を構成 する繰返し単位として、その主質、側鎖あるいは末端に **炭素-炭素不飽和結合を有するものであればよく、単独 50 タン、1,1−ビス(3−ビニル−4−ヒドロキシフェ**

重合体であっても共宜合体であってもよい。また、その 食合体領は、直鎖状、分岐状、深状のいずれの構造を有 するものであってもよく、さらに、合成時に末端停止剤 や分岐剤を用いることにより、特殊な末端構造や特殊な 分岐構造が導入されたものであってもよい。

12

【0020】このような炭素-炭素不飽和結合を有する ポリカーボネート樹脂を製造する方法については、例え は、炭酸エステル形成性化合物としてホスゲンなどを用 い、適当な酸結合剤の存在下に、炭素-炭素不飽和結合 を持つ二価フェノールを単独で、あるいは炭素ー炭素不 飽和結合を持つ二価フェノールと炭素ー炭素不飽和結合 を持たない二価フェノールとを反応させる方法、あるい は、炭酸エステル形成性化合物としてピスアリールカー ポネートを用い、エステル交換反応を行う方法などを採 用すればよい。この炭素ー炭素不飽和結合を持つ二価フ ェノールは、1種単独でも2種以上を併用してもよく、 また炭素ー炭素不飽和結合を持たない二価フェノールに ついても1種単独でも2種以上を併用してもよい。これ リカーボネート樹脂を含有していることを特徴とする電 40 、ち反応は、必要に応じて末端停止剤および/または分岐 剤の存在下で行われる。

> 【0021】この炭素-炭素不飽和結合を持つ二価フェ ノールとしては、4,4'ージヒドロキシー3,3'ー ジビニルビフェニル、4, 4'ージヒドロキシー3, 3'ージアリルピフェニル、3, 3', 5, 5'ーテト ラアリルー4、4'ージヒドロキシビフェニル、ビス (3-ビニルー4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) ジフェニルメ

ニル) エタン、1, 1ービス (3ーアリルー4ーヒドロ キシフェニル) エタン、1, 1-ピス (3-アリルー4 ーヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、2, 2 ーピス (3ーピニルー4ーヒドロキシフェニル) プロパ ン、2、2-ビス(3-アリルー4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、2、2-ビス (3-ビニルー4-ヒドロ キシー5-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス (3-アリル-4-ヒドロキシー5-メチルフェニル) プロパン、2, 2-ビス (3-アリルー4-ヒドロキシ -5-フェニルフェニル) プロパン、2, 2-ビス〔3 10 - (3-プテニル) - 4-ヒドロキシフェニル) プロバ ン、2、2-ビス[3-(4-ペンテニル)-4-ヒド ロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス[3-(5-ヘキセニル) -4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2 - (4-ヒドロキシフェニル) -2- (3-アリルー4 ーヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2ービス(3, 5-ジアリルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、 2, 2-ビス (3-ビニルー4-ヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2-ビス (3-アリルー4-ヒドロキシフ ロキシフェニル) ペンタン、3,3-ビス(3-アリル - 4 - ヒドロキシフェニル) ペンタン、1, 1 - ビス (3-ビニルー4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサ ン、1、1ービス (3ーアリルー4ーヒドロキシフェニ ル) シクロヘキサン、ビス (3-ビニルー4-ヒドロキ シフェニル) エーテル、ピス (3ーアリルー4ーヒドロ キシフェニル) エーテル、ビス (3-ビニルー4-ヒド ロキシフェニル) スルフィド、ピス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) スルフィド、ビス (3-ビニル-

4-ヒドロキシフェニル) スルホキシド、ピス (3-ア リルー4ーヒドロキシフェニル)スルホキシド、ビス (3-ビニルー4-ヒドロキシフェニル) スルホン、ビ ス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) スルホン、 3, 3' -ジピニルー4, 4' -ジヒドロキシベンソフ ェノン、3、3'ージアリルー4、4'ージヒドロキシ ベンソフェノン、4,4'-ジヒドロキシベンザルアセ トフェノン、9、9-ビス(3-ビニル-4-ヒドロキ シフェニル) フルオレン、9, 9-ピス (3-アリルー 4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス (3-アリルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル) フルオレン、1、3ーピス〔2一〔3ーアリルー4ーヒ ドロキシフェニル) プロピル] ベンゼン、1,4-ビス [2-(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)プロビ ル] ベンゼン、1、3ージヒドロキシー4ーアリルベン ゼン、4,4'ージヒドロキシー3-アリルビフェニ ル、2, 7ージヒドロキシー3, 6ージアリルナフタレ ン、4、4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1,6 ーヘプタジエン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ェニル) ブタン、3, 3ービス (3ービニルー4ーヒド 20 ル) ー3ープテン、1, 1ービス (4ーヒドロキシフェ ニル) -2-プロペン、1、1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -2-ビニルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -2-アリルシクロヘキサ ン、1、1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-2-(1-シクロヘキセニル) シクロヘキサン、さらに次式 で安される化合物などが挙げられる。

> [0022] 【化11】

【0023】これら二価フェノールの中でも、好ましい ものとしては、3、3'ージアリルー4、4'ージヒド ロキシビフェニル、2, 2-ビス(3-アリルー4-ヒ ドロキシフェニル) プロパン、2,2-ビス(3-アリ ルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロパン、 2、7~ジヒドロキシー3、6~ジアリルナフタレン、 1、1-ピス(3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2-アリルー1、1-ビス(4-ヒド め シー2、2'ージメチルピフェニル、4、4'ージヒド

ロキシフェニル) シクロヘキサン、4,4'ージヒドロ キシベンザルアセトフェノンなどが挙げられる。

【0024】また、前配の炭素-炭素不飽和結合を持た ない二価フェノールとしては、例えば、4、4'ージヒ ドロキシピフェニル、3,3'ージフルオロー4,4' -ジヒドロキシピフェニル、4, 4' -ジヒドロキシー 3. 3'ージメチルピフェニル、4,4'ージヒドロキ

16

ロキシー3. 3'ージシクロヘキシルピフェニルなどの 4. 4'ージヒドロキシビフェニル類;ピス(4ーヒド ロキシフェニル) メタン、ピス (4-ヒドロキシフェニ ル) ジフェニルメタン、ピス (4-ヒドロキシフェニ ル) フェニルメタン、ビス(3ーメチルー4ーヒドロキ シフェニル) メタン、ピス (3-ノニルー4-ヒドロキ シフェニル) メタン、ピス (3, 5-ジメテルー4-ヒ ドロキシフェニル) メタン、ピス (3, 5ージブロモー 4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (3-クロロー -4-ヒドロキシフェニル)メタン、ピス(2-ter t-プテル-4-ヒドロキシフェニル)フェニルメタ ン、ピス(2ーヒドロキシフェニル)メタン、2ーヒド ロキシフェニルー4ーヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス (2-ヒドロキシー4メテルフェニル) メタン、ビス (2-ヒドロキシー4-メテルー6-tert-プテル フェニル) メタン、ビス (2-ヒドロキシー4, 6-ジ メテルフェニル) メタン、1, 1-ビス (4-ヒドロキ シフェニル) エタン、1, 2-ビス (4-ヒドロキシフ ル) -1-フェニルエタン、1, 1-ピス (4-ヒドロ キシー3-メチルフェニル)-1-フェニルエタン、 1, 1-ビス(4-ヒドロキシー3-フェニルフェニ ル) -1-フェニルエタン、2-(4-ヒドコキシー3 ーメチルフェニル) -2- (4-ヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、1, 1-ビス(2-tert-ブチルー4-ヒドロキシー3-メチルフニニル) エタ ン、1-フェニル-1, 1-ピス (3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1-ビス(2-ヒド ロキシー4ーメチルフェニル) エタン、2,2ーピス (4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス (2-メチルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、 2, 2-ビス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス(3-イソプロピルー4-ヒド ロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス (3-sec ープテルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2 ーピス (3ーフェニルー4ーヒドロキシフェニル) プロ パン、2, 2-ビス (3-シクロヘキシルー4-ヒドロ 4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3 ーフルオロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス (3-ブロモー4-ヒドロキシフェニル) プロ パン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5-ジメテ ルフェニル) プロパン、1, 1-ビス (2-tert-ブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル) プロパ ン、2,2-ピス(4-ヒドロキシー3,5-ジクロロ フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシー 3. 5ージフルオロフェニル) プロパン、2. 2ーピス

ン、2、2-ビス(3-ブロモー4-ヒドロキシー5-クロロフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフル オロプロパン、2, 2-ピス(2-ヒドロキシー4-s e c ープチルフェニル) プロパン、2, 2 ーピス (2-ヒドロキシー4, 6ージメチルフェニル) プロパン、 2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2- (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) ブタン ・1、1ービス(4ーヒドロキシフェニル)-2ーメチル 4ーヒドロキシフェニル) メタン、ビス (3-フルオロ 10 プロパン、1, 1-ビス (2-tert-ブテルー4-ヒドロキシー5ーメチルフェニル) -2-メチルプロパ ン、1、1ーピス(2ープチルー4ーヒドロキシー5ー メチルフェニル) ブタン、1, 1-ビス (2-tert ープチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プタ ン、1, 1-ビス (2-メチル-4-ヒドロキシ-5tert-ペンチルフェニル) ブタン、2, 2-ビス (4-ヒドロキシー3、5-ジクロロフェニル) プタ ン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5-ジプロモ フェニル) プタン、2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェ ェニル) エタン、1, 1ーピス (4ーヒドロキシフェニ 20 ニル) ー3ーメテルプタン、1, 1ーピス (4ーヒドロ キシフェニル) -3-メチルブタン、3,3-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) ペンタン、2, 2ーピス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサン、2, 2-ビス(4-ヒ ドロキシフェニル) ヘプタン、2, 2-ビス (2-te rt-ブチルー4-ヒドロキシー5-メテルフェニル) ヘプタン、2、2ービス (4ーヒドロキシフェニル) オ クタン、2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) ノナ ン、2、2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)デカン、 1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) シクロペンタ 30 ン、1, 1ーピス (4ーヒドロキシフェニル) シクロへ キサン、1, 1-ビス (3-メテルー4-ヒドロキシフ ェニル) シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキ シー3, 5-ジメチルフェニル)シクロヘキサン、1。 1-ビス (3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニ ル) シクロヘキサン、1, 1-ビス (3-フェニルー4 ーヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、1, 1ービス (4-ヒドロキシフェニル) -3, 3, 5-トリメチル シクロヘキサン、1、1-ピス(3-メチルー4-ヒド ロキシフェニル) -3, 3, 5-トリメチルシクロヘキ キシフェニル) プロパン、2, 2ービス(3ークロロー 40 サンなどのビス(ヒドロキシフェニル)アルカン類;ビ ス (4-ヒドロキシフェニル) エーテル、ピス (3-フ ルオロー4ーヒドロキシフェニル) エーテルなどのビス (4-ヒドロキシフェニル) エーテル類: ピス (4-ヒ ドロキシフェニル) スルフィド、ピス (3-メテルー4 ーヒドロキシフェニル) スルフィドなどのビス (4-ヒ ドロキシフェニル) スルフィド類; ビス (4-ヒドロキ シフェニル) スルホキシド、ピス (3-メチルー4-ヒ ドロキシフェニル) スルホキシドなどのピス (4-ヒド ロキシフェニル) スルホキシド類: ピス (4-ヒドロキ (4-ヒドロキシー3, 5-ジプロモフェニル) プロパ 50 シフェニル) スルホン、ビス (3-メチルー4-ヒドロ

キシフェニル) スルホン、ピス (3-フェニルー4-ヒ ドロキシフェニル) スルホンなどのピス (4-ヒドロキ シフェニル) スルホン類;4,4'ージヒドロキシベン ゾフェノンなどのピス (4-ヒドロキシフェニル) ケト ン類;9,9-ピス(4-ヒドロキシフェニル)フルオ レン、9、9-ピス(3-メチルー4-ヒドロキシフェ ニル) フルオレン、9, 9-ビス (3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル) フルオレンなどのピス (ヒドロキ シフェニル) フルオレン類;4,4°-ジヒドロキシー p-ターフェニルなどのジヒドロキシ-p-ターフェニ 10 ル類;4, 4''' ージヒドロキシーpークォーターフ ェニルなどのジヒドロキシーp-クォーターフェニル 類;2,5-ピス(4-ヒドロキシフェニル) ピラジ ン、2,5-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,6 ージメチルピラジン、2,5-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) - 2, 6ージエチルピラジンなどのピス (ヒド ロキシフェニル) ピラジン類;1,8-ピス(4-ヒド ロキシフェニル) メンタン、2,8-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) メンタン、1,8-ピス(3-メチルー ーヒドロキシー3, 5ージメチルフェニル) メンタンな どのピス (ヒドロキシフェニル) メンタン類:1.4-ピス〔2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピ ル] ベンゼン、1、3-ピス[2-(4-ヒドロキシフ ェニル) -2-プロピル] ベンゼンなどのピス [2-(4-ヒドロキシフェニル) -2-プロピル) ベンゼン 類;1、3ージヒドロキシナフタレン、1、4ージヒド ロキシナフタレン、1、5-ジヒドロキシナフタレン、 2, 6-ジヒドロキシナフタレン、2, 7-ジヒドロキ シナフタレンなどのジヒドロキシナフタレン類:レゾル 30 シン、ヒドロキノン、カテコールなどのジヒドロキシベ ンゼン類 ; α, ωージヒドロキシポリジメチルシロキサ ン、α, ω-ビス [3-(2-ヒドロキシフェニル) ブ ロビル] ポリジメテルシロキサンなどのポリシロキサン 類;1,1,8,8-テトラヒドロー1,8-ジヒドロ キシパーフルオロオクタン、1, 1, 6, 6ーテトラヒ ドロー1, 6-ジェドロキシパーフルオロヘキサンなど のジヒドロパーフルオロアルカン類などが挙げられる。 【0025】これら各種の二価フェノール類の中でも、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、 1, 1ーピス (4ーヒドロキシフェニル) シクロヘキサ ン、ピス(4-ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタ ン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フ ェニルエタン、2, 2-ピス(4-ヒドロキシー3-メ チルフェニル) プロパン、2、2-ビス (4-ヒドロキ シー3-フェニルフェニル) プロパン、4,4'-ジヒ ドロキシピフェニル、ピス (4-ヒドロキシフェニル) スルホン、2,2-ピス(3,5-ジプロモー4-ヒド ロキシフェニル) プロパン、3、3-ビス (4-ヒドロ

シー3-メチルフェニル) フルオレン、ピス (4-ヒド ロキシフェニル) エーテル、4、4' ージヒドロキシベ ンゾフェノン、2、2-ピス(4-ヒドロキシー3-メ トキシフェニル) 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフル オロプロパン、α、ωービス〔3-(2-ヒドロキシフ ェニル) プロピル] ポリジメチルシロキサン、レゾルシ ン、2、7-ジヒドロキシナフタレンなどが好ましく、 特に2, 2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン が好ましい。

【0026】前記末端停止剤としては、一価のカルボン 酸とその誘導体や、一価のフェノールを用いることがで きる。例えば、p-tert-プチルーフェノール、p ーフェニルフェノール、n-クミルフェノール、n-パ ーフルオロノニルフェノール、pー(パーフルオロノニ ・ルフェニル)フェノール、p- (パーフルオロキシルフ ェニル)フェノール、p-tert-パーフルオロプチ ルフェノール、1- (P-ヒドロキシベンジル) パーフ ルオロデカン、p-[2-(1H, 1H-パーフルオロ トリドデシルオキシ) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキ 4-ヒドロキシフェニル) メンタン、1, 8-ビス (4 zo サフルオロプロピル) フェノール、3, 5-ビス (パー フルオロヘキシルオキシカルボニル)フェノール、p-ヒドロキシ安息香酸パーフルオロドデシル、p-(1 H, 1H-パーフルオロオクテルオキシ) フェノール、 2H, 2H, 9H-パーフルオロノナン酸、1, 1, 1, 3, 3, 3ーテトラフロロー2ープロパノールなど が好適に用いられる。これら末端停止剤の添加割合は、 共重合組成比として、1~30モル%、さらに好ましく は1~10モル%であり、この割合が30モル%を超え ると機械的強度の低下を招くことがあり、1モル%未満 であると成形性の低下を招くことがある。

【0027】また、分岐剤の具体例としては、フロログ リシン、ピロガロール、4,6ージメチルー2,4,6 ートリス (4ーヒドロキシフェニル) -2-ヘプテン、 2, 6-ジメチルー2, 4, 6-トリス (4-ヒドロキ シフェニル) -3-ヘプテン、2, 4-ジメチル-2, 4, 6-トリス (4-ヒドロキシフェニル) ヘプタン、 1, 3, 5ートリス (2ーヒドロキシフェニル) ベンゼ ン、1、3、5ートリス (4ーヒドロキシフェニル) ベ ンゼン、1, 1, 1ートリス (4ーヒドロキシフェニ 40 ル) エタン、トリス (4ーヒドロキシフェニル) フェニ ルメタン、2, 2ーピス〔4, 4ーピス〔4ーヒドロキ シフェニル)シクロヘキシル)プロパン、2,4ーピス 〔2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピ ル] フェノール、2, 6-ビス (2-ヒドロキシー5-メチルベンジル) -4-メチルフェノール、2-(4-ヒドロキシフェニル) -2-(2, 4-ジヒドコキシフ ェニル) プロパン、テトラキス (4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、テトラキス [4-(4-ヒドロキシフェニ ルイソプロピル) フェノキシ] メタン、2、4ージヒド キシフェニル) ペンタン、9,9ーピス(4ーヒドロキ so ロキシ安息香酸、トリメシン酸、シアヌル酸、3,3ー

ピス (3-メテルー4-ヒドロキシフェニル) -2-オ キソー2、3ージヒドロインドール、3、3ーピス(4 ーヒドロキシアリール) オキシインドール、5ークロロ イサチン、5、7ージクロロイサチン、5ープロモイサ チンなどが挙げられる。

19

【0028】これら分岐剤の添加量は、共重合組成比で 30モル%以下、好言しくは5モル%以下であり、これ が30モル%を超えると成形性の低下を招くことがあ る。炭酸エステル形成性化合物としては、ホスゲンなど の各種ジハロゲン化カルボニルや、クロロホーメートな 10 どのハロホーメート、炭酸エステル化合物などを用い、 酸結合剤の存在下に重縮合を行う反応は、通常、溶媒中 で行う。ホスゲンなどのガス状の炭酸エステル形成性化 合物を使用する場合、これを反応系に吹き込む方法が好 適に採用できる。この炭酸エステル形成性化合物の使用 割合は、反応の化学量論比(当量)を考慮して適宜調整 すればよい。

【0029】酸結合剤としては、例えば水酸化ナトリウ ム、水酸化ガリウム、水酸化リチウム、水酸化セシウム などのアルカリ金属水酸化物や、炭酸ナトリウム、炭酸 20 カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、ビリジンなどの有 機塩基、あるいはこれらの混合物を用いることができ る。この酸結合剤の使用割合も反応の化学量論比(当 量) を考慮して適宜調整すればよい。具体的には、原料 の二価フェノールの水酸基1モル当たり、1当量もしく はそれより過剰量、好ましくは1~5当量の酸結合剤を 使用すればよい。

【0030】ここで用いる溶媒としては、トルエン、キ シレンなどの芳香族炭化水素や、塩化メテレン、クロロ ホルム、1. 1-ジクロロエタン、1, 2-ジクロロエ 30 ポリカーボネートオリゴマーを製造する方法が効率的で タン、1, 1, 1ートリクロロエタン、1, 1, 2ート リクロロエタン、1、1、1、2ーテトラクロロエタ ン、1、1、2、2ーテトラクロロエタン、ペンタクロ ロエタン、クロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、 アセトフェノンなどが好適なものとして挙げられる。こ れら溶媒は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を組 み合わせて用いてもよい。さらに、互いに混ざり合わな い2種の溶媒を用いて界面重縮合反応を行ってもよい。 【0031】また、前記触媒としては、トリメチルアミ ンや、トリエチルアミン、トリプチルアミン、N, N- 40 ジメチルシクロヘキシルアミン、ピリジン、ジメチルア ニリンなどの三級アミン、トリメチルペンジルアンモニ ウムクロライド、トリエチルベンジルアンモニウムクロ ライド、トリブチルベンジルアンモニウムクロライド、 トリオクチルメチルアンモニウムクロライド、テトラブ **チルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウ** ムブロマイドなどの四級アンモニウム塩、テトラブチル ホスホニウムクロライド、テトラブチルホスホニウムブ ロマイドなどの四級ホスホニウム塩などが好適である。

ナトリウムやハイドロサルファイドなどの酸化防止剤を 少量添加してもよい。つぎに、前記重縮合反応を行う際 の反応条件については、反応温度は、通常、0~150 ℃、好ましくは5~40℃であり、反応圧力は減圧、常 圧、加圧のいずれでもよいが、通常は常圧もしくは反応 系の自圧程度の加圧下に行うことができる。反応時間に ついては、反応温度により左右されるが、0.5分間~ 10時間、好ましくは1分間~2時間程度である。

20

【0033】得られるポリカーボネート樹脂の分子量の 調節をするには、例えば前記反応条件の選択、前記末端 停止剤や分岐剤の使用量の増減などにより行うことがで きる。また、場合によっては、得られた重合体に適宜物 理的処理(混合、分面など)および/または化学的処理 (ポリマー反応、部分分解処理など)を施して所望の分 子量範囲のものを得るようにしてもよい。

【0034】このポリカーボネート樹脂の製造法は、機 々な態様で実施可能であり、例えば炭素-炭素不飽和結 合を有する二価フェノールおよび/または炭素ー炭素不 飽和結合を有さない二価フェノールとホスゲンなどを反 応させて、ポリカーボネートオリゴマーを製造し、つい でこのポリカーポネートオリゴマーに、上記の炭素-炭 秦不飽和結合を有する二価フェノールおよび/または炭 素ー炭素不飽和結合を有さない二価フェノールを、前記 溶媒および酸結合剤のアルカリ水溶液の混合液の存在下 に反応させる方法を採用してもよい。また、前配の炭素 - 炭素不飽和結合を有する二価フェノールおよび/また は炭素-炭素不飽和結合を有さない二価フェノールとホ スゲンを、前記溶媒とアルカリ水溶液との混合液中で反 応させる方法を採用してもよい。通常は、前者の、予め あることから好ましい。

【0035】ポリカーボネートオリゴマーを製造するに は、まず、アルカリ水溶液に炭素-炭素不飽和結合を有 する二価フェノールおよび/または炭素-炭素不飽和結 合を有さない二価フェノール(必要に応じて分岐剤を含 めて)を溶解し、二価フェノールのアルカリ水溶液を調 製する。ついで、このアルカリ水溶液と塩化メテレンな どの有機溶媒との混合液に、ホスゲンを導入して反応さ せ、炭素-炭素不飽和結合を有する二価フェノールおよ び/または炭素-炭素不飽和結合を有さない二価フェノ ールのポリカーボネートオリゴマーを合成する。つい で、反応溶液を水相と有機相とに分離し、ポリカーボネ ートオリゴマーを含む有機相を得る。この際、アルカリ 水溶液のアルカリ浸度は、1~15 宜量%の範囲が好ま しく、また有機相と水相との容積比は、10:1~1: 10、好ましくは5:1~1:5の範囲である。反応温 度は、冷却下に通常0~70℃、好ましくは5~65℃ であり、反応時間は15分間~4時間、好ましくは30 分間~3時間程度である。このようにして得られるポリ 【0032】さらに、所望により、この反応系に亜硫酸 50 カーボネートオリゴマーの平均分子量は2000以下、

重合度は、通常20以下、好ましくは2~10量体のも のである。

21

【0036】このようにして得られるポリカーボネート オリゴマーを含む有機相に、前記炭素ー炭素不飽和結合 を有する二価フェノールおよび/または炭素ー炭素不飽 和結合を有さない二価フェノールを加えて反応させる。 反応温度は、通常10~50℃、好ましくは20~40 ℃であり、反応時間は、通常30分間~2時間程度であ る。この反応にあたって、炭素-炭素不飽和結合を有す る二価フェノールおよび/または炭素ー炭素不飽和結合 を有さない二価フェノールは有機溶媒溶液および/また はアルカリ木溶液として添加するのが望ましい。その添 加順序については、特に制限はない。。なお、触媒、末 端停止剤および分枝剤などは、上配の製造法において、 必要に応じ、ポリカーボネートオリゴマーの製造時、そ の後の高分子量化の反応時のいずれか、またはその両方 において添加して用いることができる。

【0037】このようにして得られる炭素一炭素不飽和 結合を有するポリカーボネート樹脂は、前記一般式

あるいは前配一般式 [1] で表される繰返し単位(1) および一般式 [2] で表される繰返し単位(2)とから なる共重合体である。これら式〔1〕および〔2〕で表 されるポリカーボネート樹脂について、さらに具体的に 述べると、前記式[1]~[4 f]において示すX1~ X²、R¹~R⁶ が疲わす炭素数1~10のアルキル基 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、ブテル基、イソブチル基、2ープチル基、t-ブテル基、ペンテル基、ヘキシル基、ヘブチル基、オク 基などが挙げられ、また炭素数6~12のアリール基と. しては、フェニル基、トリル基、スチリル基、ピフェニ リル基、ナフチル基などが挙げられ、炭素数1~12の アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基、イソプロポキシ基、プトキシ基、イソプトキ シ基、2ープトキシ基、tープトキシ基、ペンテルオキ シ甚、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチル オキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシ ルオキシ基、ドデシルオキシ基などが挙げられ、炭素数 6~12の置換もしくは無置換のアリールオキシ基とし 40 ては、フェノキシ基、トリルオキシ基、スチリルオキシ 基、ナフチルオキシ基、ピフェニルオキシ基などが挙げ られる。また、Yが表わす少なくとも1つの炭素ー炭素 不飽和結合を持つ炭素数2~12の鎖状または環状の炭 化水素基を置換基として有する炭素数5~12のシクロ アルキリデン基としては、2-ビニル-1, 1-シクロ ヘキシリデン基、2-アリルー1, 1-シクロヘキシリ デン基、2-(1-シクロヘキセニル)-1,1-シク ロヘキシリデン基、2-ビニル-1, 1-シクロペンチ

甚、2- (1-シクロヘキセニル) -1, 1-シクロペ ンチリデン基などが挙げられる。

22

【0038】前配炭素-炭素不飽和結合を有するポリカ ーポネート樹脂が、前配繰返し単位(1)と繰返し単位

- (2) からなる共重合体である場合には、繰返し単位
- (1) のモル比 [(1)/((1)+(2))] が、 0.01以上、好ましくは0.05~0.3である。こ のモル比が、0.01未満では、これを架構させた際の 架権密度が低く、機械的強度の向上効果の発現が充分に 得られないことがある。

【0039】また、このポリカーポネート樹脂には、本 発明の目的造成を阻害しない範囲でこれら繰返し単位

(1) および (2) のほか、前記式 [2]、[3]で規 定した以外の構造単位を有するポリカーボネート単位 や、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエーテル、ポリ シロキサン構造を有する単位を含有しているものであっ

【0040】そして、このポリカーボネート樹脂は、塩 化メチレンを溶媒とする0.5g/デシリットルの透 [1] で表される繰返し単位(1)からなる単独重合体 20 度、20℃の温度で測定した還元粘度〔ヵs/c〕が 0.01~10デシリットル/gであるものが好まし い。この遺元粘度 [ns/c] が、0.01デシリット ル/g未満であると、架橋後の機械的強度が充分でない ことがある。また、10デシリットル/gを超えるもの では成形加工性が充分でないことがあり、また、溶液と した際の粘度が上昇して、後述の電子写真感光体のバイ ンダー樹脂として用いる際には、登工液の塗布による電 子写真感光体の製造が困難になることがある。

【0041】本発明の方法においては、前配炭森ー炭素 チル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル so 不飽和結合を有するポリカーボネート樹脂を、遷移金属 触媒、塩基系触媒およびラジカル化学種から選択される 1 程または2種以上の物質の存在下、同一分子内に珪素 - 水素結合を2つ以上持つ珪素化合物と反応させてヒド ロシリル化する。ここで用いる珪素化合物は、前配式 [4 a] ~ [4 f] で安される化合物であり、具体的な 化合物としては、例えばジメチルシラン、ジエチルシラ ン、ジフェニルシラン、1, 1, 3, 3-テトラメチル ジシロキサン、1、1、3、3-テトラフェニルジシロ キサン、1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘキサメチルトリシ ロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7ーオクタメ **テルテトラシロキサン、1, 1, 1, 3, 5, 7, 7,** 7ーオクタメチルテトラシロキサン、1, 4ーピス(ジ メチルシリル) ベンゼン、1,3-ビス(ジメチルシリ ル) ベンゼン、1, 1, 3, 3-テトラメチルジシラザ ン、1, 2-ピス(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシ コキサニル) エタン、α、ωージヒドロポリジメチルシ ロキサン、ポリフェニルメチルハイドロジェンシロキサ ン、メチルトリス (ジメチルシロキシ) シランなどが挙 げられる。

リデン基、2-アリル-1, 1-シクロペンチリデン 50【0042】これらシラン化合物の添加量については、

前記ポリカーポネート樹脂中の炭素一炭素不飽和結合のモル数に対して、シラン化合物中の珪素ー水素結合のモル数が0.01~100当量、好ましくは0.5~2当量の範囲となる配合比を選定するのがよい。この配合比が0.01当量未満となる添加量では、ポリカーボネート樹脂の架横による機械的物性の向上が不充分であり、また、100当量を超える配合比で添加すると、過剰に存在するシラン化合物の一部がポリカーボネート結合と反応してその重合体質が切断されるようになり、架橋に伴う機械的物性の向上効果が低減することがある。

【0043】また、前記ヒドロシリル化反応に用いる触 媒としては、上配のとおり遷移金属触媒、塩基系触媒お よびラジカル化学種を用いることができるが、これらの 中でも、遷移金属触媒が反応の収率、副反応の少なさな らびに触媒添加量の少なさから最も好ましい。この遷移 金属触媒の中でも、周期律宏の第VII族~第X族の遷 移金属触媒が好ましく、具体的には、鉄触媒〔Fe(C O) 5]、ルテニウム触媒 [RuCls]、コバルト触 媒 [Coz (CO) B]、ロジウム触媒 [(Phs P) 3 RhCl、(Rh (C2 H4) 2 Cl) 2]、イリジ ウム触媒 [IrCls]、ニッケル触媒 [(Phs P) 2 Ni、(Phs P)2 NiCl2]、パラジウム触媒 [(Ph₃ P)₄ Pd, (Ph₃ P)₂ PdCl₂], 白金触媒 [H2 PtCl6 · 6H2 O、(Ph3 P) 4 Pt、(Pt (C₂ H₄) Cl₂)₂、(Ph₃ P)₂ PtCl2, Pt (C2 H4) (Ph3 P) Cl2, (PhCN) 2 PtCl2 , K2 PtCl4 , Pt-A l₂ O₃ 、Pt-C、白金-1, 1, 3, 3-テトラメ チルー1、3ージピニルジシロキサン錯体、白金カルボ ニル錯体、白金-シクロピニルメチルシロキサン錯体] などが挙げられる。これらの中でも、Speier触媒 (H2 PtCls・6H2 O-イソプロパノール溶液) および白金-1, 1, 3, 3-テトラメチル-1, 3-ジビニルジシロキサン錯体がとくに好ましい。

【0044】また、塩基系触媒としては、例えばトリメ チルアミンやトリエチルアミンなどの各種トリアルキル アミンを用いることができる。さらに、ラジカル化学種 としては、例えば、ベンゾイルパーオキサイド、2,4 ージクロロベンゾイルパーオキシド、アゾビスイソブチ ロニトリルなどのパーオキサイドを用いることができる。

【0045】そして、これら触媒の添加量は、前記ポリカーボネート樹脂の炭素・炭素不飽和結合に対し、1wtPPM~1wt%、好ましくは100~1000wtPPMの範囲において、反応性を考慮して適宜選択する。この触媒の添加量が、1wtPPM未満であると反応速度が遅く、架橋反応が進行しないことがある。またこれが1wt%を超えると得られる製品が着色するおそれがあるので、上記範囲内とするのが適当である。

【0046】さらに、この反応時の温度は、20~20 50

0℃、好きしくは50~150℃において行うのが適している。反応温度を20℃よりも低くすると、反応速度が低下し、またこれを200℃以上で行ってもそれに見合う効果はなく、かえって不経済である。反応時間については、1秒間~24時間、好ましくは1分間~12時間である。この反応時間を1秒間未満としたのでは充分に反応が進行しないことがあり、また24時間を超える時間をかけるのは経済的でない。

【0047】このようにして得られる本発明の架橋ポリ カーボネート樹脂は、例えば、前配同一分子内に珪素ー 水素結合を2つ以上持つ珪素化合物において、1つの珪 索-水素結合が、前配炭素-炭素不飽和結合を有するポ リカーボネート樹脂の分子鎖中の炭素ー炭素不飽和結合 と結合し、また、2つ目以降の珪素-水素結合が、別の ポリカーボネート分子鎖中の炭素ー炭素不飽和結合と結 合した形態の結合部位を有し、このような結合部位が数 多くのポリカーボネート分子鎖の間に形成されている。 【0048】本発明の架橋ポリカーボネート樹脂の架橋 構造は、架橋に用いる炭素ー炭素不飽和結合を有するポ リカーボネート樹脂の化学構造、とくに不飽和結合のポ リカーボネート分子鎖への結合部位とその数、前配珪素 化合物の化学構造によって、様々な形態を有するものと なっている。本発明の架橋ポリカーボネート樹脂の構造 について、具体例を示すと、たとえば下配のものがあ

(0049)
[(K12]
(0-Ar²-0-c)
(0)
(R')Lept W (R')Lept OCO
(R')Lept OCO

W:ケイ素を含む二価以上の基

[0050] 【化13】

W:ケイ素を含む二価以上の基

[0051] 【化14】

W:ケイ素を含む二価以上の基

--(0-Ar2-0-c)

W:ケイ素を含む二価以上の基

[0054] 【化17】

[0052] 【化15】

W:ケイ素を含む二価以上の基

. [0053] 【化16】

27

$$\frac{-\left(0-Ar^{2}-0-c\right)}{\left(0-Ar^{2}-0-c\right)}$$

$$\frac{-\left(0-Ar^{2}-0-c\right)}{\left$$

【0055】 【化18】

W:ケイ素を含む二価以上の基

W:ケイ素を含む二価以上の基

【0056】 {上記式中、Ar²、X¹、R¹、R²、

[0057]

p、q、r、s、c、d、e、tは、前記式 [1] ~

【化19】

[2d] におけるものと同じ意味を有し、Wは、

$$-(CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{SI} - (CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{R^{7}}$$

$$-(CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{SI} - O - \frac{R^{7}}{SI} - (CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{R^{7}}$$

$$-(CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{SI} - O - \frac{R^{7}}{SI} - R^{7}$$

$$-(CH_{2})_{2} - \frac{R^{7}}{SI} - \frac{R^{7}}{SI} - (CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{R^{7}}$$

$$-(CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{SI} - \frac{R^{7}}{I} - \frac{R^{7}}{I} - (CH_{2})_{1} - \frac{R^{7}}{I} - \frac{R^{7$$

【0058】 (式中、R⁷、i、m、n、t、u、v、 wは、前記式 [2 d] ~ [4 f] におけるものと同じ意 味を有する)で表される基である。]

このようにして反応させてヒドロシリル化した本発明の 架橋ポリカーボネート樹脂は、高い透明性を保持してい るので、高度の透明性の要求される素材に適している。 また、耐熱性や耐衝撃性、耐摩耗性などの機械的性質、 さらに電気絶縁性に優れていることから、このような諸 性質を禁ね備えていることが要求される電気機器、電子 機器、光学機器などの構成部材や部品、自動車部品、金 展あるいは木工製品のコート材、塗料など広い産業分野 において、有用性の高い案材として利用することができ

【0059】つぎに、本発明の電子写真感光体は、導電 性基体上に感光層を設けた電子写真感光体であって、そ の感光層が上記架橋ポリカーボネート樹脂を含有する衰 面層を有するものである。本発明の電子写真感光体は、 このような感光層が導電性基体上に形成されたものであ る限り、その構造に特に制限はなく、単層型、積層型な どの公知の程々の形式の電子写真感光体はもとより、ど のようなものとしてもよい。通常は、感光層が少なくと も1層の電荷発生層と、表面層を形成する少なくとも1 層の電荷輸送層を有する積層型電子写真感光体が好まし く、少なくとも1層の電荷輸送層中に、上記架機ポリカ ーポネート樹脂がパインダー樹脂としておよび/または 前記表面層として用いられていることが好ましい。

【0060】本発明の電子写真感光体において、上記架 **ペポリカーボネート樹脂をパインダー樹脂として用いる** 場合、この架橋ポリカーボネート樹脂を1種のみまたは 2種以上を組合せて用いてもよいし、また、所望に応じ て本発明の目的達成を阻害しない範囲で、他のポリカー ボネート樹脂などの樹脂成分と併用してもよい。本発明 の電子写真感光体に用いられる導電性基体としては、公 知のものなど各種のものを使用することができ、具体的 には、アルミニウムやニッケル、クロム、パラジウム、 チタン、モリブデン、インジウム、金、白金、銀、錦、 亜鉛、真鍮、ステンレス、酸化鉛、酸化ዴ、酸化インジ ウム、ITOもしくはグラファイトからなる板やドラ ム、シート、ならびに蒸着、スパッタリング、塗布など によりコーティングするなどして導電処理したガラス、 布、紙もしくはプラスチックのフィルム、シートおよび シームレスベルト、ならびにアルミニウムなどの金属箔 を積層したプラスチックのフィルム、シートおよびシー ムレスベルトならびに金属板のフィルム状シートおよび シームレスベルト、ならびに電極酸化などにより金属酸 化処理した金属ドラムなどを使用することができる。 【0061】積層型電子写真感光体の電荷発生層は、少 なくとも電荷発生物質を含むものであり、この電荷発生 層はその下地となる基体上に、真空蒸着法や化学蒸着 法、スパッタリング法によって、電荷発生物質の層を形 成するか、またはその下地となる居上に電荷発生物質を バインダー樹脂を用いて結着してなる層を形成せしめる

ことによって得ることができる。バインダー樹脂を用いる電荷発生屋の形成方法としては公知の方法など、各種の方法を使用することができるが、通常、たとえば、電荷発生物質をパインダー樹脂と共に適当な溶媒により分散もしくは溶解した強工液を、所定の下地となる層上に逸布し、乾燥せしめる方法が好適に用いられる。このようにして得られる電荷発生層の厚さは、0.01~2.0ミクロン、好ましくは0.1~0.8ミクロンである。電荷発生層はの厚さを0.01ミクロン未満にすると均一な厚さに層を形成することが困難であり、また、2.0ミクロンを超えると電子写真特性の低下を招くことがあるからである。

【0062】ここで用いる電荷発生物質としては、公知の各種のものを使用することができる。具体的な化合物としては、非晶性セレンや三方晶セレンなどのセレン単体、テルル単体、セレンーテルル合金、セレンーと素合金などのセレン合金、AszSes などのセレン化合物もしくはセレン含有組成物、酸化亜鉛、CdSーSeなどの合金、第12族および第16族元素からなる無機材料、酸化チタンなどの酸化物系半導体、アモルファスシリコンなどのシリコン系材料、で型無金属フタロシアニン、双型無金属フタロシアニンなどの無金属フタロシアニン、双型無金属フタロシアニン、の型類フタロシアニン、ア型類フタロシアニン、・取型類フタロシアニン、ア型類フタロシアニン、・取型類フタロシアニン、ア型類フタロシアニン、A型チタニルフタロシアニン、B型チタ

$$\begin{array}{c|c}
\hline
z^{2} \\
N - N - N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
N & N & Z^{2} \\
N & N & N
\end{array}$$

【0065】〔式中、Z¹~Z¹は、各々独立にピロール環上の2個の炭素原子と共に、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環もしくは複素環を形成することができる原子団を殺し、Mは2個の水素原子または配位子を有していてもよい金属原子もしくは金属化合物を宏わ40す。〕

[0066] 【化21】

 $Ar^6 \leftarrow N = N - Cp)_+$

[6]

. . .

ニルフタロシアニン、C型チタニルフタロシアニン、D 型チタニルフタロシアニン、E型チタニルフタロシアニ ン、F型チタニルフタロシアニン、G型チタニルフタロ シアニン、H型チタニルフタロシアニン、K型チタニル フタロシアニン、L型チタニルフタロシアニン、M型チ タニルフタロシアニン、N型テタニルフタロシアニン、 Y型デタニルフタロシアニン、オキソチタニルフタロシ アニン、X線回折図におけるプラック角26が27.3 ±0.2度に強い回折ピークを示すチタニルフタロシア ニンなどの金属フタロシアニン顔料、シアニン染料、ア ントラセン顔料、ピスアゾ顔料、ピレン顔料、多環キノ ン顔料、キナクリドン顔科、インジゴ顔科、ペリレン顔 料、ピリリウム染料、スクニアリウム顔料、アントアン トコン顔料、ベンズイミダソール顔料、アソ顔料、テオ インジゴ顔料、キノリン顔料、レーキ顔料、オキサジン 顔料、ジオキサジン顔料、トリフェニルメタン顔料、ア ズレニウム染料、トリアリールメタン染料、キサンチン 染料、チアジン染料、チアビリリウム染料、ポリビニル カルバソール、ピスペンソイミダソール顔料などが挙げ られる。これら化合物は、1種単独で、あるいは2種以 上のものを混合して、電荷発生物質として用いることが

【0063】これら電荷発生物質のなかでも、次の一般式で表される化合物が好適なものとして挙げられる。

[0064]

[化20]

できる。

(5)

【0067】 [式中、Ar® は、芳香族炭化水素環もしくは複素環を含んでいてもよい共役系を有する t 価の残 基を表し、tは1以上の正数であり、Cpは芳香族系水 酸基を有するカップラー残基を表し、tが2以上の場合、各Cpは同一であっても異なっていてもよい。] 【0068】

【化22】

【0069】 [式中、 $X^2 \sim X^5$ は、各々独立に、酸素原子、硫貴原子、セレン原子を表し、 R^P 、 R^Q は、炭素数 $1 \sim 12$ のアルキル基もしくはアリール基を表し、 X^2 または X^3 と R^P 、 X^4 または X^5 と R^Q とで世換基を有していてもよい複素環を形成していてもよい。〕

そして、フルオレン系ジスアン顔料としては、つぎの化合物がある。 【0070】 【化23】

[0071]

【化24】

[0072]

【化25】

【0073】また、ペリレン系顔料としては、次の化合 【0074】 物がある。 【化26】

[0075]

【化27】

【0076】多環キノン顔料としては、次の化合物があ 【0077】 る。 (化28】

X:ハロゲン原子、ニトロ姜、 シアノ基、アシル基又は カルポキシル基

n=0~6の登数

【0078】アントアントロン顔料としては、次の化合物がある。

[0079]

[(£29]

【0080】ジベンズピレンキノン顔料としては、次の化合物がある。

【0081】 【化30】

【0082】ビラントロン顔料としては、次の化合物がある。

【0083】 【化31】

【0084】また、電荷発生層に用いるバインダー樹脂 としては、特に制限はなく、公知の各種のものを使用す ることができる。具体的には、ポリスチレン、ポリ塩化 ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共園 合体、ポリビニルアセタール、アルキッド樹脂、アクリ ル樹脂、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネート、ポ リウレタン、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミ ド、ポリケトン、ポリアクリルアミド、ブチラール樹 重合体、メタクリル樹脂、スチレンーブタジエン共重合 体、塩化ビニリデンーアクリロニトリル共宜合体、塩化 ピニルー酢酸ピニルー無水マレイン酸共重合体、シリコ ーン樹脂、シリコーン-アルキッド樹脂、フェノールー ホルムアルデヒド樹脂、スチレン-アルキッド樹脂、メ ラミン樹脂、ポリエーテル樹脂、ペンソグアナミン樹 脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート 樹脂、ポリーNービニルカルバソール、ポリビニルプチ ラール、ポリピニルホルマール、ポリスルホン、カゼイ ン、ゼラチン、ポリビニルアルコール、エチルセルロー 30 ス、ニトロセルロース、カルボキシーメチルセルロー ス、塩化ビニリデン系ポリマーラテックス、アクリロニ トリループタジエン共重合体、ピニルトルエンースチレ ン共重合体、大豆油変性アルキッド樹脂、ニトロ化ポリ スチレン、ポリメチルスチレン、ポリイソプレン、ポリ **ゲオカーポネート、ポリアリレート、ポリハロアリレー** ト、ポリアリルエーテル、ポリビニルアクリレート、ポ リエステルアクリレートなどが挙げられる。上記電荷発 生層におけるバインダー樹脂として、本発明の架橋ポリ カーボネート樹脂を使用することもできる。

【0085】つぎに、電荷輸送層は、下地となる層(例 えば電荷発生層)上に、電荷輸送物質をバインダー樹脂 で結着してなる層を形成することによって得ることがで きる。この賃荷輸送層の形成方法としては、公知の方法 などの各種の方式を使用することができるが、通常、意 荷輸送物質を本発明における架橋前のポリカーボネート 樹脂と共に、適当な溶媒に分散もしくは溶解した逸工液 を、所定の下地となる層上に塗布し、乾燥させる方式な どが使用される。電荷輸送層形成に用いられる電荷輸送 物質とポリカーボネート樹脂との配合割合は、好ましく 50

は重量比で20:80~80:20、さらに好ましくは 30:70~70:30である。

【0086】この電荷輸送層において、上記ポリカーボ ネート樹脂は、1種単独で用いることもできるし、また 2種以上を混合して用いることもできる。また、本発明 の目的達成を阻害しない範囲で前記電荷発生層に用いら れるパインダー樹脂として挙げたような樹脂を、上記ポ リカーボネート樹脂と併用することもできる。このよう 脂、ポリエステル樹脂、塩化ビニリデンー塩化ビニル共 20 にして形成される電荷輸送層の厚さは、5~100ミク ロン、好ましくは10~30ミクロンである。この厚さ が5ミクロン未満にすると初期電位が低くなり、100 ミクロンを超えると電子写真特性が低下することがあ

> 【0087】前記電荷輸送物質としては、公知の各種の 化合物を使用することができる。このような化合物とし ては、カルバソール化合物、インドール化合物、イミダ ソール化合物、オキサゾール化合物、ピラゾール化合 物、オキサジアソール化合物、ピラソリン化合物、テア ジアソール化合物、アニリン化合物、ヒドラゾン化合 物、芳香族アミン化合物、脂肪族アミン化合物、スチル ベン化合物、フルオレノン化合物、キノン化合物、キノ ジメタン化合物、テアソール化合物、トリアソール化合 物、イミダゾロン化合物、イミダゾリジン化合物、ビス イミダソリジン化合物、オキサゾロン化合物、ベンゾチ アソール化合物、ベンズイミダソール化合物、キナソリ ン化合物、ベンソフラン化合物、アクリジン化合物、フ ェナジン化合物、ポリーN-ピニルカルバソール、ポリ ピニルピレン、ポリピニルアントラセン、ポリピニルア 40 クリジン、ポリー9ーピニルフェニルアントラセン、ピ レンーホルムアルデヒド樹脂、エチルカルバゾール樹 脂、あるいはこれら構造を主鎖や側鎖に有する重合体な どが好適に用いられる。これら化合物は、1種単独で使 用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0088】これら化合物としては、次の一般式で安さ れるものが好速に使用できる。

[0089] 【化32】

[B]

【0090】 [式中、Ar1 ~Ar3 は、各々独立に、 炭素数1~10の置換もしくは無置換のアルキル基、炭 素数7~13の置換もしくは無置換のアラルキル基、炭

【0092】 [式中、R^~R] は、各々独立にシアノ 基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アシル基、ヒドロ キシル基、ニトロ基、アミノ基、アルキルアミノ基、ア・ リールアミノ基、アラルキルアミノ基、炭素数1~10 の置換もしくは無置換のアルキル基、炭素数 7~13の 置換もしくは無置換のアラルキル基、炭素数6~12の 20 置換もしくは無置換のアリール基、多環式炭化水素基、 置換もしくは無置換の結合多環式炭化水素基、複素環式 基、多環系複素環式基、縮合多環系複素環式基を表し、 A~Dは各々0~5の整数である。]

[0093]

【化34】

$$Ar^{1} \xrightarrow{(R^{1})_{z}} R^{E} \qquad (10)$$

【0094】 [式中、Ar¹、Ar² は、各々独立に水 素原子、炭素数1~10の置換もしくは無置換のアルキ ル基、炭素数7~13の置換もしくは無置換のアラルキ ル芸、炭素数6~12の置換もしくは無置換のアリール

【0098】 [式中、Ar¹ ~Ar⁵ は、前配式 [1 0〕におけるArlと同一の意味を有し、Arf、Ar 1は、各々独立に炭素数1~6の置換もしくは無置換の アルキレン基、あるいは炭素数6~12の置換もしくは 無置換のアリール化合物、多環式炭化水築、置換もしく は無置換の縮合多環式炭化水素、複素環化合物、多環系 複素環化合物、縮合多環系複素環化合物の2価残基を表 し、Ar¹ とAr²、Ar³ とAr⁴ とは、環を形成し ていてもよい。〕

[0099]

素数6~12の置換もしくは無置換のアリール基、多環 式炭化水泵基、置換もしくは無置換の縮合多環式炭化水 素基、複素環式基、多環系複素環式基、縮合多環系複素 環式基を絞し、Arl とArl 、Arl とArl 、Ar 3 とAr1 とで漆を形成していてもよい。)

[0091]

[化33]

基、多環式炭化水泵基、置換もしくは無置換の縮合多環 式炭化水菜基、複素環式基、多環系複素環式基、縮合多 環系複素環式基を表し、Arl とArl は葉を形成して いてもよい。R^ は、前記式 [9] におけるR^ と問ー の意味を有し、RB は、エテレン基またはエチニレン基 を表し、Eは0~4の整数である。]

[0095]

【化35】

$$Ar^{1} \xrightarrow{\mathbb{R}^{F}} \mathbb{R}^{G}$$

$$(11)$$

【0096】 [式中、Ar¹、Ar² は、前記式 [1 30 0) におけるAr¹ と同一の意味を有し、Ar¹·とAr ² は環を形成していてもよい。R^A は、前配式 [9] に おけるR^A と同一の意味を有し、R^F、R^G は各々独立 に水素原子、ハロゲン原子または炭素数1~6のアルキ ル基を表し、Eは0~4の整数である。]

[0097]

【化36】

【化37】 [13]

【0100】 [式中、Ar¹ ~Ar⁴ は、前配式 [1 0〕におけるAr¹ と同一の意味を有し、Ar¹ とAr ²、Ar³とAr¹とは、環を形成していてもよい。R * 、R1は、前記式 [9] におけるR4 と同一の意味を の 有し、E、Fは、各々独立に0~4の整数である。]

【0102】 [式中、 $Ar^1 \sim Ar^4$ は、前配式 [10] における Ar^1 と同一の意味を有し、 Ar^1 と Ar^2 、 Ar^3 と Ar^4 とは、無を形成していてもよい。 $R^4 \sim R^5$ は、前配式 [9] における R^4 と同一の意味を有し、 $E \sim G$ は、各々独立に $0 \sim 4$ の整数である。 X^1 は、 $-O \sim -S \sim -S = \sim -T = \sim -CR^1$ $R^4 \sim -S i R^1$ $R^4 \sim -NR^1 \sim -PR^1 \sim ($ ただし、 R^1 、 R^4 は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基、炭素数 $1 \sim 1$ の 置換もしくは無置換のアラルキル基、炭素数 $1 \sim 1$ の の 置換もしくは無置換のアラ

ルキル基、炭素数6~12の関換もしくは無置換のアリール基、多環式炭化水素基、置換もしくは無置換の縮合 多環式炭化水泵基、複素環式基、多環系複索環式基、縮 合多環系複素環式基を安す)を表わす。〕

50

[0103] [化39]

【0104】 [式中、 Ar^1 、 Ar^2 は、前記式 [10] における Ar^1 と同一の意味を有し、 Ar^1 と Ar^2 は、葉を形成していてもよい。 R^4 は、前記式 [9] における R^4 と同一の意味を有し、 $Atto \sim 5$ の整数である。〕

[0105] 【化40】

$$Ar^{4}$$

$$C=CH-V-N$$

$$(R^{B})_{F}$$

$$Ar^{5}$$

$$(R^{A})_{E}$$

$$(R^{A})_{E}$$

$$(R^{A})_{E}$$

【0106】 [式中、Ar¹ ~Ar⁵ は、前記式 [1 0] におけるAr¹ と同一の意味を有し、R^A 、R ^B は、前記式 [9] におけるR^A と同一の意味を有し、 Ar¹ とAr² 、Ar³ とAr⁴ とは、環を形成してい てもよい。〕 【010.7】 【化41】

[0109]

$$C = CE + CE = CE - N$$

$$(R^B)_3$$

$$(R^A)_4$$

$$(R^A)_5$$

【0108】 [式中、Ar¹ は、前配式 [10] におけるAr¹ と同一の意味を有し、R⁴ ~R^c は、前配式 [9] におけるR⁴ と同一の意味を有し、nは0または

と同一の意味を有し、nは0または [化42]

Ar1

N CH=CH→ C=N-N

(R^C)_E

(R^C)_E

(R^C)_E

(R^C)_E

【0110】 【式中、 $Ar^1 \sim Ar^3$ は、前記式 [10] における Ar^1 と同一の意味を有し、 $R^4 \sim R^5$ は、前記式 [9] における R^4 と同一の意味(ただし、 R^1 は水素原子であってもよい)を有し、n は 0 をたは 1 であり、E は 0 \sim 4 の整数、H は 0 \sim 3 の整数である。〕

[0111] [化43] CH=N-N Ar²
(19)

1であり、A~Cは0~5の整数である。]

[0112] 〔式中、Ar¹、Ar²は、前配式 [1 0] におけるAr¹ と同一の意味を有し、Ar¹ とAr 50 ² は、環を形成していてもよい。〕 51

52

【0114】 [式中、Ar'~Ar' は、前記式 [10] におけるAr'と同一の意味を有し、Ar'とAr'は、葉を形成していてもよい。] 【0115】 【化45】

$$(\mathbb{R}^{2})_{0}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

$$(\mathbb{R}^{2})_{1}$$

【0116】 〔式中、 $R^A \sim R^D$ 、 R^I 、 R^J は、前記式 [9] における R^A と同一の意味を有し、 $A\sim D$ 、I、J は、各々独立に $0\sim 5$ の整数である。〕

[0117] [化46]

$$Ar^{4} C = CH - (Ar^{5} + CH) = C$$

$$Ar^{3} Ar^{3} = CH - (Ar^{5} + CH) = C$$

[22]

【0118】 〔式中、Ar¹ へAr⁴ は、前記式 [10] におけるAr¹ と同一の意味を有し、Ar⁶ は、炭素数1~6の置換もしくは無置換のアルキレン基、あるいは炭素数6~12の置換もしくは無置換のアリール化合物、多環式炭化水素、置換もしくは無置換の縮合多環式炭化水素、複素環化合物、多環系複素環化合物、縮合

O PA

多葉系複素環化合物の2 価残基を表し、 Ar^1 と Ar^2 、 Ar^3 と Ar^4 とは葉を形成していてもよく、nは0 または1 である。)

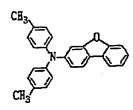
【0119】 【化47】

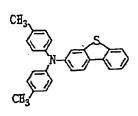
[23]

【0120】 [式中、R^L ~R⁰ は、前記式 [9] におけるR^A と同一の意味を有する。」 具体的には、つぎに示すような化合物が用いられる。 [0121] [化48] CH₃ CH₃

[0122] [化49]

$$\begin{array}{c} C_2 H_5 \\ \\ C_2 H_5 \end{array}$$





[0123]

40 【化50】

[0124]

[化51]

[0125]

【化52】

61

[0126]

【化53】

30

40

[0127]

【化54】

[0128]

【化55]

[0129]

30

40

[0130]

【化57】

$$CH_3$$
 $CH=CH-CH_3$

[0131]

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

【化58】

74

$$N-CH=CH-CH-N(C_2H_5)_2$$

$$CH^{2}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow OC^{2}H^{2}$$

[0132]

【化59】

34

40

$$H_3$$
C $CH=C$ $CH=C$ $CH=C$ $CH=C$ $CH=C$

[0133]

$$\begin{array}{c|c} C = CH - CH = C \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ C = CH - CH = C \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CE = C \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CE = C \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\$$

【化60】

[0134]

【化61】

[0135]

【化62】

H₃C CH₃

$$\mathbb{R}^3\mathbb{C}$$
 $-\mathbb{C}\mathbb{R}^3$

[0136]

[任63]

[0137]

【化64】

[0138]

40 【化65】

[0139]

[166]

CH₃

CH₃ CH₃

H3C-CH3 CH3 CH3

H₃ CH₃

CH₃
CH₃
CH₃

 $\mathbb{E}_{5}C_{2}$

CH₃
CH₃
CH₃
CH₃

CH₃
CH₃
CH₃
CH₃
CH₃
CH₃

[0140]

40 【化67】

[0141] [化68]

[0142]

40 【化69】

[0143]

40 【化70】

[0144]

【化71】

[0145]

【化72】

[0146]

[化73]

[0147] 【化74】

[0148]

【化75】

$$\begin{array}{c} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

[0149]

40 【化76】

[0150]

【化77】

$$C = CH - CH = N - N$$

$$C = CH - CH = N - N$$

$$C = CH - CH = N - N$$

[0151]

113

[0152]

【化79】

[0153]

[化80]

118

[0154]

【化81】

[0155]

【化82】

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_2$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

$$CH_3O$$

Br
$$C_2H_5$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5

$$CH_3O$$
 $N-CH=N-N$
 CH_2
 CH_3O
 CH

[0156]

[化83]

[0157]

40 【化84】

$$CH = N - N$$

[0158]

20 【化85】

30

[0159]

【化86】

[0160]

40 【化87】

$$\begin{array}{c} \text{CEH-CH} = \text{C} \\ \text{CC2} \\ \text{C} \\ \text{$$

[0161]

40 【化88】

[0162]

40 【化89】

[0163]

【化90】

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH=N-N \\ CH=N-N$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH=N-N \\
CH=N-N
\end{array}$$

$$CH=N-N \\
CH=N-N$$

$$CH=N-N$$

$$CH=N$$

$$CH$$

[0164]

【化91】

139

140

$$(C_2H_5)_2N \longrightarrow N - N \\ -N(C_2H_5)_2N \longrightarrow CE = CH \longrightarrow N(C_2H_5)_2$$

$$(CH_3)_2 N \longrightarrow N(C_3H_7)_2 \qquad (C_2H_5)_2 N \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N(C_2H_5)_2$$

$$C_2H_5)_2N$$
 CH_3
 CH_3

[0165]

[化92]

50

40

[0166]

【化93】

【0167】本発明の電子写真感光体においては、前記 導電性基体と感光層との間に、通常使用されるような下 引き層を設けることができる。この下引き層としては、 酸化テタンや酸化アルミニウム、ジルコニア、テタン 酸、ジルコン酸、ランタン鉛、チタンブラック、シリ カ、チタン酸鉛、チタン酸パリウム、酸化錫、酸化イン ジウム、酸化珪素などの微粒子、ポリアミド樹脂、フェ ノール樹脂、カゼイン、メラミン樹脂、ベンゾグアナミ ン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、セルロー ス、ニトロセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビ ニルプチラール樹脂などの成分を使用することができ る。また、この下引き層に用いる樹脂として、前記パイ ト樹脂を用いてもよい。これら微粒子や樹脂は単独また は種々混合して用いることができる。これらの混合物と して用いる場合には、無機質徴粒子と樹脂を併用する と、平滑性のよい皮膜が形成されることから好適であ る。

【0168】この下引き層の厚みは、0.01~10ミ クロン、好ましくは0.01~1ミクロンである。この 厚みが0.01ミクロン未満であると、下引き層を均一 に形成することが困難であり、また10ミクロンを超え

電性基体と感光層との間には、通常使用されるような公 知のブロッキング層を散けることができる。このブロッ 30 キング層としては、前記のバインダー樹脂と同種の樹脂 を用いることができる。また本発明のポリカーボネート 樹脂を用いてもよい。このブロッキング層の厚みは、 0.01~20ミクロン、好ましくは0.1~10ミク ロンである。この厚みが0.01ミクロン未満である と、ブロッキング層を均一に形成することが困難であ り、また20ミクロンを超えると電子写真特性が低下す ることがある。

【0169】さらに、本発明の電子写真感光体には、感 光層の上に、保護層を積層してもよい。この保護層に ンダー樹脂を用いてもよいし、本発明のポリカーボネー 40 は、前記のパインダー樹脂と同種の樹脂を用いることが できる。また、本発明のポリカーボネート樹脂を用いる ことが特に好ましい。この保護層の厚みは、0.01~ 20ミクロン、好ましくは0.1~10ミクロンであ る。そして、この保護層には、前記電荷発生物質、電荷 輸送物質、添加剤、金属やその酸化物、窒化物、塩、合 会、カーボンブラック、有機導電性化合物などの導電性 材料を含有していてもよい。

【0170】さらに、この電子写真感光体の性能向上の ために、前記電荷発生層および電荷輸送層には、結合 ると電子写真特性が低下することがある。また、前配導 50 剤、可塑剤、硬化性媒、流動性付与剤、ピンホール制御 剤、分光感度増感剤(増感染料)を添加してもよい。主 た、繰返し使用に対しての残留電位の増加、帯電電位の 低下、威度の低下を防止する目的で種々の化学物質、酸 化防止剤、界面活性剤、カール防止剤、レベリング剤な どの抵加剤を抵加することができる。

【0171】前記結合剤としては、シリコーン樹脂、ポ リアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、 エポキシ樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカーボネート樹 脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリレート樹脂、ポリ レン樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリ クロロプレン樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、エチル セルロース樹脂、ニトロセルロース樹脂、尿素樹脂、フ ェノール樹脂、フェノキシ樹脂、ポリピニルブチラール 樹脂、ホルマール樹脂、酢酸ビニル樹脂、酢酸ビニル/ 塩化ピニル共重合樹脂、ポリエステルカーボネート樹脂 などが挙げられる。また、熱および/または光硬化性樹 脂も使用できる。いずれにしても、食気絶縁性で通常の 状態で皮膜を形成し得る樹脂であれば、特に制限はな

【0172】この結合剤は電荷輸送物質に対して、5~ 200重量%の配合割合で添加することが好ましく、1 0~100重量%がより好ましい。この結合剤の配合剤 合が5重量%未満では感光層の皮膜が不均一になりやす く、画質が劣る傾向があり、200重量%を超えると感 度が低下し、残留電位が高くなる傾向がある。前記可塑 剤の具体例としては、ビフェニル、塩化ビフェニル、o ーターフェニル、ハロゲン化パラフィン、ジメテルナフ タレン、ジメチルフタレート、ジプチルフタレート、ジ オクテルフタレート、ジエチレングリコールフタレー ト、トリフェニルフォスフェート、ジイソプチルアジベ ート、ジメチルセパケート、ジブチルセバケート、ラウ リル酸ブチル、メチルフタリールエチルグリコレート、 ジメチルグリコールフタレート、メチルナフタレン、ベ ンゾフェノン、ポリプロピレン、ポリスチレン、フルオ ロ炭化水素などが挙げられる。

【0173】前記硬化触媒の具体例としては、メタンス ルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジノニルナフ タレンジスルホン酸などが挙げられ、流動性付与剤とし ては、モダフロー、アクロナール4Fなどが挙げられ、 ピンホール制御剤としては、ベンゾイン、ジメチルフタ レートが挙げられる。これら可塑剤や硬化触媒、流動付 与剤、ピンホール制御剤は、前配電荷輸送物質に対し て、5重量%以下で用いることが好ましい。

【0174】また、分光感度増感剤としては、増感染料 を用いる場合には、例えばメチルバイオレット、クリス タルバイオレット、ナイトブルー、ピクトリアブルーな どのトリフェニルメタン系染料、エリスロシン、ローダ ミンB、ローダミン3R、アクリジンオレンジ、フラペ オシンなどのアクリジン染料、メチレンブルー、メチレ 50 ングリーンなどのチアジン染料、カプリブルー、メルド ラブルーなどのオキサジン染料、シアニン染料、メロシ アニン染料、スチリル染料、ピリリュウム塩染料、チオ ピリリュウム塩染料などが適している。

146

【0175】感光層には、感度の向上、残留電位の減 少、反復使用時の疲労低減などの目的で、電子受容性物 質を添加することができる。その具体例としては、無水 コハク酸、無水マレイン酸、ジブロモ無水マレイン酸、 無木フタル酸、テトラクロロ無木フタル酸、テトラブロ アクリルアミド樹脂、ポリプタジエン樹脂、ポリイソブ 10 モ無水フタル酸、3-ニトロ無水フタル酸、4-ニトロ 無水フタル酸、無水ピロメリット酸、無水メリット酸、 テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、o ージニトロペンゼン、 血ージニトロペンゼン、1、3、 5-トリニトロベンゼン、p-ニトロベンソニトリル、 ピクリルクロライド、キノンクロルイミド、クロラニ ル、プロマニル、ベンソキノン、2、3-ジクロロベン ゾキノン、ジクロロジシアノパラベンゾキノン、ナフト キノン、ジフェノキノン、トロポキノン、アントラキノ ン、1-クロロアントラキノン、ジニトロアントラキノ ン、4-ニトロペンソフェノン、4、4'ージニトロペ ンゾフェノン、4ーニトロベンザルマロンジニトリル、 α-シアノ-β- (p-シアノフェニル) アクリル酸エ チル、9-アントラセニルメチルマロンジニトリル、1 ーシアノー (pーニトロフェニル) -2- (p-クロロ フェニル) エチレン、2, 7-ジニトロフルオレノン、 2, 4, 7-トリニトロフルオレノン、2, 4, 5, 7 ーテトラニトロフルオレノン、9-フルオレニリデンー (ジシアノメチレンマロノニトリル)、ポリニトロー9 ーフルオレニリデンー(ジシアノメチレンマロノジニト 30 リル)、ピクリン酸、o-二トロ安息香酸、p-二トロ 安息香酸、3,5-ジニトロ安息香酸、ペンタフルオロ 安息香酸、5-ニトロサリチル酸、3、5-ジニトロサ リチル酸、フタル酸、メリット酸などの電子親和力の大 きい化合物が好ましい。これら化合物は電荷発生層、電 荷輸送層のいずれに加えてもよく、その配合割合は、電 荷発生物質または電荷輸送物質に対して0.01~20 0重量%、好ましくは0.1~50重量%である。

> 【0176】また、設面性の改良のため、四フッ化エチ レン樹脂、三フッ化塩化エチレン樹脂、四フッ化エチレ ン六フッ化プロピレン樹脂、フッ化ビニル樹脂、フッ化 ビニリデン樹脂、二フッ化二塩化エチレン樹脂およびそ れらの共重合体、フッ案系グラフトポリマーを用いても よい。これら安面改質剤の配合割合は、前配パインダー 樹脂に対して、0.1~60重量%、好ましくは5~4 0重量%である。この配合割合が0. 1重量%より少な いと、衰面耐久性、表面エネルギー低下などの表面改質 が充分でなく、60重量%より多いと、電子写真特性の 低下を招くことがある。

> 【0177】前記酸化防止剤としては、ヒンダードフェ ノール系酸化防止剤、芳香族アミン系酸化防止剤、ヒン

ダードアミン系酸化防止剤、スルフィド系酸化防止剤、 有機リン酸系酸化防止剤などが好ましい。これら酸化防 止剤の配合割合は、前配電荷輸送物質に対して、通常、 0.01~10重量%、好ましくは0.1~2重量%で ある。 【0178】ヒンダードフェノール系の酸化防止剤としては、以下の例がある。 【0179】 【化94】

[0180]

【化95】

[0181]

【化96】

【0182】また、芳香族アミン系の酸化防止剤として 40 [0183] は、以下の例がある。 【化97】

tC4H9

153

$$\stackrel{R}{\longleftarrow} - NE - \stackrel{\frown}{\bigcirc} \stackrel{R}{\longleftarrow} - NE - \stackrel{\frown}{\bigcirc} - NH - \stackrel{\frown}{\bigcirc}$$

(R: 好)基、 环心基等0

C₂H₅O C_CCH₃
CCH₃
CCH₃

154

【0184】また、ヒンダードアミン系の酸化防止剤としては、以下の例がある。

[0185] [化98]

40

50

【0186】また、スルフィド系の酸化防止剤として は、以下の例がある。

CH₃

[0187] 【化99】

CH₃

CH₂ CH₂ COOC ₁₂ H₂₅

S
CH₂ CH₂ COOC ₁₂ H₂₅

CH₂ CH₂ COOC ₁₃ H₂₇

S
CH₂ CH₂ COOC ₁₃ H₂₇

CH₂ CH₂ COOC ₁₄ H₂₉

S
CH₂ CH₂ COOC ₁₄ H₂₉

CH₂ CH₂ COOC ₁₄ H₂₉

CH₂ CH₂ COOC ₁₈ H₃₇

157

【0188】有機リン系の酸化防止剤としては、以下の 例がある。

$$S = \begin{cases} CH_{2}CH_{2}COOC_{12}H_{25} \\ CH_{2}CH_{2}COOC_{18}H_{37} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} TC_{4}H_{9} \\ CH_{2}CH_{2}COOC_{18} \end{bmatrix} CH_{3}$$

$$CH_{3}CH_{2}CH_{2} + COOC_{14}A1ky1)$$

 $(\texttt{C}_{12} \texttt{H}_{25} \texttt{S} \texttt{CH}_2 \texttt{CH}_2 \texttt{COOCH}_2)_{4} \texttt{C}_{\pm}$

【0189】 【化100】

__

【0190】さらに、ヒンダードフェノール構造単位と ヒンダードアミン構造単位とを同一分子内に有する酸化 防止剤としては、以下の例がある。

[0191]

【化101】

162

161

【0192】これら酸化防止剤は、1種単独で用いても よく、2種以上を混合して用いてもよい、そして、これ らは前記感光層のほか、表面保護層や下引き層、ブロッ キング層に添加してもよい。前記電荷発生層、電荷輸送 層の形成の際に用いる溶媒としては、例えばベンゼン、 トルエン、キシレン、クロルベンゼンなどの芳香族系溶 媒や、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ンなどのケトン類、メタノール、エタノール、イソプロ パノールなどのアルコール類、酢酸エテル、エチルセロ ソルプなどのエステル類、四塩化炭素、クロロホルム、 ジクロロメタン、テトラクロロエタンなどのハロゲン化 炭化水梁、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエー テル類、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ド、ジエチルホルムアミドなどが挙げられる。これら溶 媒は、1種単独で用いてもよく、2種以上を混合して用 いてもよい。

【0193】つぎに、前記電荷輸送層を形成する方法と

形成に用いる前配炭素ー炭素不飽和結合を有するポリカ ーポネート樹脂および前記珪素化合物ならびに前配触媒 を溶媒に分散または溶解させてなる鐙工液を調製し、こ れを所定の下地となる例えば前記電荷発生層の上に登工 し、前記ポリカーボネート樹脂中の炭素ー炭素不飽和結 合をヒドロシリル化して、重合体質が架構化したポリカ ーポネート樹脂がバインダー樹脂として電荷輸送物質と 共存する形態の電荷輸送層を形成する。ここで、前記触 媒は、塗工液中には添加することなく電荷輸送層を形成 した後に、これを添加してもよい。

【0194】前記登工液を調製する方法としては、前記 の調合原料をボールミル、超音波、ペイントシェーカ ー、レッドデビル、サンドミル、ミキサー、アトライタ ーなどを用いて、分散あるいは溶解させることができ る。このようにして得られた塗工液を塗工する方法につ いては、浸渍塗工法、静電塗工法、粉体塗工法、スプレ 一登工法、ロール登工法、アプリケーター登工法、スプ しては、前記電荷輸送物質、添加剤、パインダー樹脂の 50 レーコーター盤工法、パーコーター盤工法、ロールコー

ター鐙工法、ディップコーター塗工法、ドクターブレー ド登工法、ワイヤーバー詮工法、ナイフコーター登工 法、アトライター登工法、スピナー登工法、ピード登工 法、プレード強工法、カーテン強工法などが採用でき

【0195】また、単層型電子写真感光体の感光層の形 成は、前記の質荷輸送物質、電荷輸送物質、添加剤、バ インダー樹脂の形成に用いる炭素ー炭素不飽和結合を有 するポリカーボネート樹脂、珪素化合物、触媒を溶媒に 分散または溶解した溶液を所定の下地となる基体上に塗 10 実施例1 布し、前記ポリカーボネート樹脂中の炭素ー炭素不飽和 結合をヒドロシリル化することにより行われる。この法 合の鈴工液を課製やその鈴工法、添加剤などに関して は、上記積層型電子写真感光体の感光層の形成の場合と 同様である。さらに、この単層型電子写真感光体におい ても、上記と同様に下引き層、ブロッキング層、表面保 護屠を設けてもよい。これら層の形成にも、本発明の架 橋ポリカーボネート樹脂を用いることが好ましい。

【0196】 単層型電子写真感光体における感光層の厚 さは、5~100ミクロン、好ましくは8~50ミクロ 20 ンであり、これが5ミクロン未満であると初期電位が低 くなりやすく、100ミクロンを超えると電子写真特性 が低下することがある。この単層型電子写真感光体の製 造に用いられる電荷発生物質:パインダー樹脂の比率 は、重量比で1:99~30:70、好ましくは3:9 7~15:85である。また、電荷輸送物質:パインダ 一樹脂の比率は、重量比で10:90~80:20、好 ましくは30:70~70:30である。

【0197】つぎに、上記のように釜工して形成した釜 樹脂と珪素化合物との反応を行うが、この場合の反応温 度は20~200℃、好ましくは50~150℃であ り、反応時間は1秒間~24時間、好ましくは1分間~ 12時間である。このようにして得られる本発明の電子 写真感光体は、優れた耐摩耗性を有し、長期間にわたっ て優れた耐刷性および電子写真特性を維持する感光体で あり、複写機(モノクロ、マルチカラー、フルカラー: アナログ、デジタル) プリンター (レーザー、LED、 液晶シャッター)、ファクシミリ、製版機などの各種の 電子写真分野に好適に用いられる。

【0198】また、本発明の電子写真感光体を使用する にあたっては、符章には、コロナ放電(コロトロン、ス コロトロン)、接触帯電(帯電ロール、帯電ブラシ)な どが用いられる。また、露光には、ハロゲンランプや蛍 光ランプ、レーザー(半導体、He-Ne)、LED、 感光体内部な光方式のいずれを採用してもよい。現像に は、カスケード現像、二成分磁気ブラシ現像、一成分絶 録トナー現像、一成分導電トナー現像などの転式現像方 式や湿式現像方式が用いられる。転写には、コロナ転 写、ローラ転写、ベルト転写などの静電転写法や、圧力 so 来する繰返し単位と、〔b〕 2, 2 ーピス(3 ーアリル

転写法、粘着転写法が用いられる。定着には、熱ローラ 定着、ラジアントフラッシュ定着、オープン定着、圧力 定着などが用いられる。さらに、クリーニング・除電に は、ブラシクリーナー、磁気ブラシクリーナー、静電ブ ラシクリーナー、磁気ローラクリーナー、プレードクリ ーナーなどが用いられる。

164

[0199]

【実施例】以下、実施例により、本発明をさらに具体的 に説明する。

(1) 炭菜-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパン74 gを、6重量%濃度の水酸化ナトリウム水溶液550ミ リリットルに溶解した溶液に、塩化メチレン250ミリ リットルを加えて資拌しながら、冷却下、該溶液にホス ゲンガスを950ミリリットル/分間の割合で15分間 吹き込んだ。ついで、この反応液を静置して有機層を分 離し、重合度が2~4であり、分子末端がクロロホーメ ート基であるポリカーボネートオリゴマーの塩化メチレ ン溶液を得た。

【0200】このポリカーボネートオリゴマーの塩化メ チレン溶液200ミリリットルに、塩化メチレンを加え て全量を450ミリリットルとした後、これに、2,2 ーピス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) ブロバ ン20.6gを、8重量%濃度の水酸化ナトリウム水溶 液150ミリリットルと混合し、さらに分子量調節剤と してp-tertープチルフェノール2. 0gを加え た。つぎに、この混合液を激しく攪拌しながら、触媒と 膜中の炭素ー炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 30 して7重量%濃度のトリエチルアミン水溶液を2ミリリ ットル加え、28℃において、提拌下に1.5時間反応 した。反応終了後、反応生成物を塩化メチレン1リット ルで希釈し、ついで、水1.5リットルで2回、O.O 1規定過度の塩酸1リットルで1回、さらに水1リット ルで2回の順で洗浄した後、有機層をメタノール中に投 入し、析出した固体を濾過して乾燥することにより、ポ リカーボネート樹脂を得た。上記で得られたポリカーボ ネート樹脂につき、塩化メチレンを溶媒とする濃度 0. 5g/デシリットルの溶液の20℃で測定(以下の実施 例も同一条件において測定) した還元粘度 [カsp/ c] は、0.89デシリットル/gであった。遠元粘度 の測定は、離合社製の自動粘度測定装置VMR-042 を用い、自動粘度用ウッペローデ改良型粘度計 (RM 型)で測定した。また、このポリカーボネート樹脂につ いて測定した! H-NMRスペクトルにおいては、3. 5ppmおよび5.1ppmにアリル基に基づく吸収ビ ークが認められ、また7~8ppmに全芳香族に基づく 吸収ピークが認められ、これらの強度比より、 [a] 2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンに由

- 4-ヒドロキシフェニル)プロパンに白来する繰返し 単位との共宜合組成を算出した結果、 [a]: [b]= 0.85:0.15であった。

【0201】(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造 次に、上配(1)で得られたポリカーボネート樹脂 0. 5gおよび珪素化合物として1、4ーピス(ジメチルシ リル) ベンゼン0.065gを、塩化メチレン5ミリリ ットルに溶解し、これに触媒として白金ー1,1,3, 3-テトラメテルジビニルジシロキサン錯体0.002 gのキシレン溶液(濃度:5 重量%)を添加し、これを ポリエチレンテレフタレートのフィルム上に、アプリケ ーターを用いてキャスト製膜した。 ついで、これを1時 間風乾した後、120℃に昇温して、常圧で2時間反応 させ、さらに120℃、1mmHgの条件で12時間乾 燥することにより、ヒドロシリル化によって架構された ポリカーボネート樹脂のフィルムを得た。

【0202】ここで得られた架橋ポリカーボネート樹脂 について、赤外線吸収スペクトル分析を行った結果、架 橋反応を行う前の同分析において認められていた164 0 c m-1 のピニル基の仲縮に基づく吸収が消失してお り、このことから架橋反応を行う前のポリカーポネート 樹脂に存在していたアリル基が架橋反応により飽和し て、トリメチレン結合に変化したと考えられる。したが って、この架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下 記のとおりであると認められた。

[0203]

【化102】

$$(E 1 0 2)$$

$$(CH_3) = (CH_2)_3 - (CH_2)_3 -$$

【0204】 (3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーボネート街脂フィル ムについては、その透明性を評価するため可視光線の光 線透過率を測定するとともに、スガは験機社製のスガ摩 耗試験機NUS-ISO-3型を用いて、耐摩耗性の評 価試験をした。摩耗試験の条件としては、500gの荷 重をかけた摩耗紙 (スガ試験機社製: 粒径3ミクロンの させた後の試料の重量減少量を測定する方法を採用し た。これら結果を第1表に示す。第1表中の透明性の概 に、O印が表示してあるものは、350~600nmの 波長域の全域における光線透過率が90%以上であった ことを示し、×印が表示してあるものは、350~60 0 n m の 波長域において光線透過率が 9 0 % 未満の 波長 坂があったことを示す。

166

[0205] 実施例2

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーポネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2、2-ビス(3-アリル-4-ヒド ロキシフェニル) プロパンに代えて、3、3'ージアリ ルー4, 4'ージヒドロキシビフェニル17.8gを用 いた他は、実施例1と同様にして、ポリカーボネート樹 脂を得た。得られたポリカーボネート樹脂の還元粘度 [η s p/c] は、0.86デシリットル/gであっ た。また、「H-NMRスペクトルを測定した結果、 3. 5ppmおよび5. 1ppmのアリル基に基づく吸 収ピークと、7~8ppmの全芳香族水素に基づく吸収 ピークとの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共 重合組成を算出した結果、 [a] 2, 2-ビス (4-ヒ ドロキシフェニル) プロバンに由来する繰返し単位と、 [b] 3, 3' ージアリルー4, 4' ージヒドロキシビ フェニルに由来する繰返し単位とが、 [a]: [b]= 0.85:0.15であった。

【0206】(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造 上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実 旋例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架 橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリ カーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであると 認められた。

[0207] 0.15

【0208】(3)架構ポリカーボネートの評価 アルミナ粒子を含有)上で、食料を2000回往復運動 50 上記(2)で得られた架構ポリカーポネート樹脂につ き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1役に示す。

【0209】 実施例3

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 素脂の製造

実施例1で用いた2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) プロパンに代えて、1, 1-ビス (4-ヒドロキシ フェニル) シクロヘキサン87gを用い、2,2ーピス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) プロパンに代 えて、9、9-ビス(3-アリルー4-ヒドロキシー5 10 ーメテルフェニル) フルオレン30.7gを用いた他 は、実施例1と同様にして、ポリカーボネート樹脂を得 た。ここで得られたポリカーボネート樹脂の遠元粘度 [nsp/c]は、0.85デシリットル/gであっ た。また、1 H-NMRスペクトルを測定した結果、 3. 5ppmおよび5. 1ppmのアリル基に基づく吸 収ピーク、および7~8ppmの全芳香族水素に基づく 吸収ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の 共重合組成を算出した結果、[a] 1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサンに由来する繰返し 20 単位と、[b] 9, 9ーピス (3ーアリルー4ーヒドロ キシー5-メチルフェニル)フルオレンに由来する繰返 し単位とが、[a]: [b]=0.80:0.20であ

(2) 架橋ポリカーポネート樹脂の製造

上記 (1) で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実施例1の(2) と同様にして珪素化合物を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった。

[0210] 【化104】

$$W^{1}:-(CH_{2})_{3}-\underbrace{\overset{CH_{3}}{\underset{CH_{3}}{\text{CH}_{3}}}}_{CH_{3}}-\underbrace{\overset{CH_{3}}{\underset{CH_{3}}{\text{CH}_{2}}}}_{CH_{3}}-$$

【0211】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。

168

【0212】 実施例4

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーポネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) プロパンに代えて2、2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン83gを用い、2、2-ピス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン に代えて、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ー 1-フェニルエタン12.8gおよび2,7-ジヒドロ キシー3,6-ジアリルナフタレン5.5gを用いた他 は、実施例1と同様にして、ポリカーボネート樹脂を得 た。ここで得られたポリカーボネート樹脂の還元粘度 [nsp/c]は、0.83デシリットル/gであっ た。また、1 H-NMRスペクトルを測定した結果、 3. 5ppmおよび5. 1ppmのアリル基に基づく吸 収ピークと、1.·7ppmの2、2-ビス(3-メチル -4-ヒドロキシフェニル)プロパンに基づく吸収ピー クおよび7~8ppmの全芳香族水素に基づく吸収ピー クの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共重合組 成を算出した結果、[a] 2, 2-ビス(3-メチルー 4-ヒドロキシフェニル) プロパンに由来する繰返し単 位と、[b] 1, 1-ピス (4-ヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタンに由来する繰返し単位、および [c] 2、7-ジヒドロキシ-3、6-ジアリルナフタ レンに由来する繰返し単位とが、 [a]: [b]: [c] = 0.85:0.10:0.05であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得られたポリカーボネート機能に対し、実施例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった。

[0213] [化105]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} C$$

【0214】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 純性の評価をした。結果を第1表に示す。

【0215】 実施例 5

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル) プロパンに代えて1、1、1、3、3、3-ヘキサ フルオロー2, 2ーピス (4ーヒドロキシフェニル) プ 30 ロパン109gを用い、2、2-ピス(3-アリルー4 -ヒドロキシフェニル) プロパンに代えて2, 2-ビス (3-フェニルー4-ヒドロキシフェニニル) プロパン 6. 5gおよび1, 1-ビス (3-アリル-4-ヒドロ キシフェニル) シクロヘキサン17. 4gを用いた他 は、実施例1と同様にして、ポリカーボネート樹脂を得 た。ここで得られたポリカーボネート樹脂の還元粘度 [nsp/c]は、0.78デシリットル/gであっ た。また、1 H-NMRスペクトルを刻定した結果、 3. 5ppmおよび5. 1ppmのアリル基に基づく吸 40 収ピークと、6.8ppmの2,2-ビス(3-フェニ ルー4ーヒドロキシフェニル)プロパンに基づく吸収ビ ーク、および7~8ppmの全芳香族木楽に基づく吸収 ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共食 合組成を算出した結果、[a] 1, 1, 1, 3, 3, 3 ーヘキサフルオロー2、2ーピス(4ーヒドロキシフェ ニル)プロパンに由来する繰返し単位と、〔b〕2,2 ーピス (3-フェニルー4ーヒドロキシフェニル) プロ パンに由来する繰返し単位、および [c] 1, 1-ビス

ンに由来する繰返し単位とが、[a]:[b]:[c] = 0.80:0.05:0.15であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実施例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった。

ペンに由来する繰返し単位、および [c] 1, 1-ビス 【0217】(3) 架橋ポリカーボネートの評価(3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサ 50 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ

き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。 実施例6

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーポネート 徴脂の製造

実施例1で用いた2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパンに代えて3, 3-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -1-プロペン73gを用い、2, 2-ビス

(3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) プロパンに代えてビス (4-ヒドロキシフェニル) ジフェニルメタン 23.6 g および下記シリコーン変性ピスフェノール1 g を用いた他は、実施例1と同様にして、ポリカーポネート機能を得た。

172

【0218】 【化107】

【0219】ここで得られたポリカーボネート樹脂の還元粘度 [nsp/c] は、0.85デシリットル/gであった。また、1H-NMRスペクトルを測定した結果、5ppmのビニル基に基づく吸収ピークと、0ppmの上記シリコーン変性ピスフェノールに基づく吸収ピーク、および7~8ppmの全芳香族水素に基づく吸収ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共重合組成を算出した結果、[a]3,3~ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-プロペンに由来する繰返し単位と、[b]ピス(4-ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタンに由来する繰返し単位、および[c]上記シリコ

ーン変性ピスフェノールに白来する繰返し単位とが、 [a]:[b]:[c]=0.85:0.149:0. 001であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

エの上記シリコーン変性ピスフェノールに基づく吸収ピ 上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実ーク、および7~8ppmの全芳香族水素に基づく吸収 20 旋例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共重 橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであっロキシフェニル)-1-プロペンに由来する繰返し単位 た。

[0220] [化108]

【0221】 (3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で待られた架橋ポリカーボネート樹脂につ 耗性の評価をした。結果を第1 表に示す。 実施例 7

き、実旋例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 w (1)炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート

樹脂の製造

実施例1で用いた2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) プロパンに代えて4, 4'-ジヒドロキシベンザル アセトフェノン [別名:4、4'ージヒドロキシカルコ ン〕78gを用い、2、2-ビス(3-アリル-4-ヒ ドロキシフェニル) プロパンに代えて4, 4'ージヒド ロキシベンソフェノン9. 4 g および4, 4'ージヒド ロキシジフェニルエーテル4.6gを用いた他は、実施 例1と同様にして、ポリカーボネート樹脂を得た。

元粘度 [nsp/c] は、0.84デシリットル/gで あった。また、このポリカーボネート樹脂の共重合組成 は、[a] 4, 4' ージヒドロキシベンソフェノンに由 来する繰返し単位と、 [b] 4, 4'ージヒドロキシジ フェニルエーテルに由来する繰返し単位、および〔c〕

4, 4'ージヒドロキシベンザルアセトフェノンに由来 する繰返し単位とが、〔a〕: [b]: [c]=0.1 0:0.005:0.85であった。

174

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実 旋例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架 権ポリカーボネート樹脂を製造した。この架橋ポリカー ボネート樹脂の赤外線吸収スペクトル分析の結果では、 架構させる前のポリカーボネート樹脂に認められたビニ 【0222】ここで得られたポリカーポネート樹脂の還 10 ル基の伸縮に基づく1620cm-1 の吸収が消失したこ とから、この架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、 下記のとおりであると認められた。

> [0223] 【化109】

【0224】(3)架橋ポリカーポネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーポネート樹脂につ き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1 衷に示す。

宾旋例 8

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) プロパンに代えて1、3-ビス[2-(4-ヒドロ キシフェニル)プロピル]ベンゼン112gを用い、 2, 2-ビス (3-アリルー4-ヒドロキシフェニル) プロパンに代えて4,4'-ジヒドロキシスルホン8. 5gおよび2ーアリルー1、1ービス(4ーヒドロキシ フェニル)シクロヘキサン10.5gを用いた他は実施 例1と同様にして、ポリカーボネート樹脂を得た。

【0225】ここで得られたポリカーボネート樹脂の還 元粘度 [nsp/c] は、0.78デシリットル/gで あった。また、1 H-NMRスペクトルを測定した結 果、3.5ppmおよび5.1ppmのアリル基に基づ く吸収ピークと、1. 7ppmの1, 3-ピス (2-(4-ヒドロキシフェニル) プロピル) ベンゼンに基づ の

30 く吸収ピークおよび7~8 ppmの全芳香族水素に基づ く吸収ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂 の共重合組成を算出した結果、[a]1,3-ビス[2 - (4-ヒドロキシフェニル)プロピル]ベンゼンに由 来する繰返し単位と、[b] 4, 4'ージヒドロキシス ルホンに由来する繰返し単位、および〔c〕2-アリル -1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキ サンに由来する繰返し単位とが、 [a]: [b]:

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

40 上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実 施例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架 橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリ カーボネート樹脂の化学構造は、下配のとおりであっ

[0226] 【化110】 175

【0227】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐撃 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。 実施例9

176

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2,2ービス(3ーアリルー4ーヒドロキシフェニル)プロパンに代えて4,4'ージヒドロキシビフェニル12.3gおよび下記シリコーン変性ビスフェノール10gを用いた他は、実施例1と同様にしてポリカーボネート樹脂を得た。

[0228]

【0229】ここで得られたポリカーボネート樹脂の選 およ 元 計度 [nsp/c] は、0.78 デシリットル/gで する あった。また、1 H-NMRスペクトルを測定した結 5:果、0ppmに上記シリコーン変性ビスフェノールに基 づく吸収ビークと、1.7ppmの2,2ービス(4ー ヒドロキシフェニル)プロパンに基づく吸収ピークおよ び7~8ppmの全芳香族水素に基づく吸収ピークの強 度比から、このポリカーボネート樹脂の共富合組成を算 カー出した結果、[a] 2,2ービス(4ーヒドロキシフェ 30 た。ニル)プロパンに由来する繰返し単位と、[b] 4,4'ージヒドロキシピフェニルに由来する繰返し単位、【fg

および [c] 上記シリコーン変性ピスフェノールに由来 する繰返し単位とが、 [a]: [b]: [c]=0.8 5:0.14:0.01であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記 (1) で得られたポリカーボネート樹脂に対し、実施例1の(2) と同様にして珪素化合物を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった。

[0230]

【0231】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ

き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 50 軽性の評価をした。結果を第1表に示す。

实施例10

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2,2-ビス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)プロパンに代えて2,2-ビス(3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン16.7gおよび下記シリコーン化合物20gを用いた他は、実施例1と同様にしてポリカーボネート樹脂を得た。

[0232]

【化113】

【0233】ここで得られたポリカーボネート樹脂の遺元粘度 $[\eta s p/c]$ は、0.78 デシリットル/gであった。また、 1 H-NMRスペクトルを測定した結果、0ppmに上記シリコーン化合物に基づく吸収ピークと、1.7ppmの2, 2-ピス(4-ヒドロキシフ

エニル) プロパンに基づく吸収ピークおよび6.8ppmの2,2-ピス(3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル) プロパンに基づく吸収ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共重合組成を算出した結果、

178

[a] 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) プロパンに由来する繰返し単位と、[b] 2, 2-ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル) プロパンに由来する繰返し単位、および[c]上記シリコーン化合物に由来する繰返し単位とが[a]:[b]:[c]=0.85:0.10:0.05であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得られたポリカーボネート樹脂に対し、臭 施例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架 橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった

[0234] [化114]

【0235】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 40 耗性の評価をした。結果を第1接に示す。 実施例11

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例1で用いた2,2ーピス(3ーアリルー4ーヒドロキシフェニル)プロパンに代えて2,2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン5.2gを用い、かつ、分子量調節剤として用いたpーtertーブチルフェノールに代えて2ーアリルフェノール11.8gを用いたほかは、実施例1と同様にしてポリカーポネート樹脂を50

得た。

【0236】ここで得られたポリカーボネート樹脂の遠元粘度 [nsp/c] は、0.18デシリットル/gであった。また、1HードMRスペクトルを測定した結果、3.5ppmと5.1ppmのアリル基に基づく吸収ピークと、1.7ppmの2,2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンに基づく吸収ピークの強度比から、このポリカーボネート樹脂の共重合組成を算出した結果、[a] 2,2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンに由来する繰返し単位と、[b] 2ーアリルフェノールに由来する繰返し単位とが、[a]:[b] = 0.82:0.18であった。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得られたポリカーポネート樹脂に対し、実施例1の(2)と同様にして珪素化合物を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。得られた架橋ポリカーボネート樹脂の化学構造は、下記のとおりであった。

[0237] [化115]

【0238】 (3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記 (2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。

突施例12

(1) 炭素ー炭素不飽和結合を有するポリカーポネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造した。

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造 上記(1) で得たポリカーボネート樹脂 0.5 g に対 し、実施例 1 の(2) と同様にして、ジフェニルシラン 0.12 g を反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。このようにして得られた架橋ポリカーボネート 樹脂は、下記の構造を有するものであった。

[0239]

【化116】

180

【0240】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。 実施例13

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造した。

(2) 架橋ポリカーポネート樹脂の製造

上記(1)で得たポリカーボネート樹脂0.5gに対し、実施例1の(2)と同様にして、1,1,3,3ーテトラメチルジシロキサン0.09gを反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。このようにして得られた架橋ポリカーボネート樹脂は、下記の構造を有するものであった。

[0241]

【化117】

【0242】(3) 架梯ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 転性の評価をした。結果を第1表に示す。

奥施例14

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造し た

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得たポリカーボネート樹脂0.5gに対し、実施例1の(2)と同様にして、1,1,3,3,5,5-ヘキサメチルトリシロキサン0.14gを反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。このようにして得られた架橋ポリカーボネート樹脂は、下記の構造を有するものであった。

[0243]

【化118]

【0244】(3)架橋ポリカーボネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 純性の評価をした。結果を第1表に示す。

実施例15

(1) 炭素ー炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造し ★

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造 上記(1) で得たポリカーボネート樹脂 0.5 g に対 し、実施例 1 の(2) と同様にして、1,1,1,3, 5,7,7-オクタメチルテトラシロキサン 0.1

95gを反応させ、架橋ポリカーポネート樹脂を製造し

た。このようにして得られた架橋ポリカーボネート樹脂 は、下記の構造を有するものであった。

182

[0245]

【化119】

$$W^{7}: -(CH_{2})_{3} - \overset{CH_{3}}{\underset{5}{\overset{CH_{3}}{=}}} - \overset{CH_{3}}{\underset{5}{\overset{CH_{3}}{=}}} - (CH_{2})_{3} -$$

【0246】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。 実施例16

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造した

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記(1)で得たポリカーボネート樹脂0.5gに対し、実施例1の(2)と同様にして下記に示す珪素化合物0.045gを反応させ、架橋ポリカーボネート樹脂を製造した。

[0247]

【化120】

【0248】このようにして得られた架橋ポリカーボネート樹脂は、下配の構造を有するものであった。

[0249]

【化121】

$$W^{8}: H_{3}C = \begin{cases} CH_{3} & CH_{3} \\ SI = O \\ CH_{3} & CH_{3} \end{cases} = \begin{cases} CH_{3} & CH_{3} \\ SI = O \\ CH_{2} & CH_{3} \end{cases}$$

【0250】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2)で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。 実施例17

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造し

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造

上記 (1) で得たポリカーボネート樹脂 O. 5 g に対 し、実施例1の(2)と同様にして、1,1,3,3-テトラメチルジシラザン0.09gを反応させ、架構ポ リカーボネート樹脂を製造した。このようにして得られ た架橋ポリカーボネート樹脂は、下配の構造を有するも のであった。

[0251]

【化122】

$$W^{9}: -(CH_{2})_{3}-\underset{CH_{3}}{\overset{CH_{3}}{\underset{H}{\text{CH}_{3}}}}-\underset{CH_{3}}{\overset{CH_{3}}{\underset{CH_{3}}{\underset{CH_{3}}{\text{CH}_{2}}}}}$$

【0252】(3)架橋ポリカーボネートの評価 上記 (2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につ き、実施例1の(3)と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。

40 実施例18

(1) 炭素-炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 樹脂の製造

実施例2と同様にして、ポリカーボネート樹脂を製造し

(2) 架橋ポリカーボネート樹脂の製造 上記 (1) で得たポリカーポネート樹脂 0. 5gに対 し、実施例1の(2)と同様にして、1,2-ビス (1.1.3,3-テトラメチルジシロキサニル)エタ ン0.095gを反応させ、架構ポリカーボネート機脂 50 を製造した。このようにして得られた架橋ポリカーボネ

186

ート樹脂は、下配の構造を有するものであった。 【0253】 【化123】

【0254】(3) 架橋ポリカーボネートの評価 上記(2) で得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、実施例1の(3) と同様にして、透明性および耐摩 耗性の評価をした。結果を第1表に示す。

【0255】比較例1

前述の特開平4-29314号公報記載の実施例と同じ 方法により、ポリカーボネート樹脂を製造し、架橋処理 した後、得られた架橋ポリカーボネート樹脂の透明性お よび耐摩耗性の評価をした。すなわち、提拌機と温度 計、ガス導入管および還流冷却器を備えた三つロフラス コに、乾燥窒素ガスを流しながら濃度48.5重量%の 木酸化ナトリウム木溶液53.7度量部、水230.8 so 重量部、2,2-ピス(3-アリルー4-ヒトロキシフ ェニル) プロパン31. 4重量部、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン27. 3重量部を 仕込んで溶解した。この溶液を20℃に冷却し、提拌し ながらホスゲンガス26、2重量部を1時間かけて徐々 に導入した。ついで、濃度48、5重量%の水酸化ナト リウム水溶液 8. 4重量部を加え、さらに反応停止剤と してp-tert-ブチルフェノール0、61 重量部を 加え、30℃で1時間重合反応を続けた。反応終了後、 塩化メチレン層を分離して塩酸酸性にした後、水洗して 40 溶存塩類を除去した。その後、塩化メチレンを蒸発して 固体を得た。この重合体の還元粘度は1. 2デシリット ル/gであった。

【0256】つぎに、このポリカーボネート樹脂0.5gと、架橋剤としてペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオネート)0.05gおよびイルガキュアー907(チバガイギー社製)0.005gとを、塩化メテレン5ミリリットルに溶解させた。この溶液を厚み250ミクロンのポリエチレンテレフタレートフィルムの上に、アプリケーターを用いてキャスト製50

膜した。さらに、これを1時間風乾した後、120℃、1mmHgにおいて12時間乾燥した。得られたサンプルに、80 w/cm²の高圧水銀灯を5秒間照射して、架橋ポリカーボネート樹脂のフィルムを得た。このようにして得られた架梯ポリカーボネート樹脂につき、前配実施例1の(3)と同様に透明性および耐摩耗性の評価をした。結果を第1表に示す。

【0257】比較例2

上記比較例1において得られた架橋処理を施す前のポリカーボネート樹脂0.5gとアゾピスイソブチロニトリル0.025gを、塩化メチレン5ミリリットルに加えて溶解し、塗工液とした。この塗工液を、厚み250ミクロンのポリエチレンテレフタレートフィルム上に、アブリケーターを用いてキャスト製膜した。つぎに、これを140℃において1時間加熱することにより、架橋反応を行い、ついで、120℃、1mmHgにおいて12時間乾燥することによって、架橋ポリカーボネート樹脂につき、前記実施例1の(3)と同様に透明性および耐摩耗性の評価をした。結果を第1安に示す。

【0258】比較例3

原料の二価フェノールとして2,2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)プロパンを用いて製造した還元粘度0.77デシリットル/gのポリカーボネート樹脂を、塩化メチレンに溶解させた後、キャスト法により製膜した。【0259】このようにして得られた架橋ポリカーボネート樹脂につき、前記実施例1の(3)と同様に透明性および耐摩耗性の評価をした。結果を第1歳に示す。

[0260]

【表1】

187

第1安(1)

| | 透明性 序結盤 (mg) | |
|--------------|--------------|------|
| 実施列 1 | 0 | 0. 8 |
| 実施列 2 | 0 | 0. 5 |
| 类形 3 | 0 | 0. 6 |
| 突起列 4 | 0 | 0. 5 |
| 实施第 5 | 0 | 0. 6 |
| 支持第 6 | 0 | 0. 9 |
| 実施列 7 | 0 | 0. 9 |
| 突进列 8 | 0 | 0. 9 |
| 実施列 8 | 0 | 0. 6 |
| 0 1 医社会 | 0 | 0. 7 |
| 英施例11 | 0 | J. 9 |
| 実施到12 | 0 | 0. 5 |
| 実施例13 | 0 | 0. 6 |
| 実施例14 | 0 | 0. 7 |

【0261】 【**资**2】

第1表(2)

| | 透明性 | 摩耗量 (mg) |
|--------------|-----|----------|
| 突热列15 | 0 | 0. 7 |
| 実施到16 | 0 | 0. 7 |
| 实施列17 | 0 | 0. 9 |
| 実施列18 | 0 | 0. 7 |
| 比較例 1 | × | 1. 5 |
| 上較例 2 | × | 1. 5 |
| 比較列 3 | 0 | 2. 1 |

【0262】 奥施例19

188

準度性基体としてアルミニウム会属を蒸着したポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムを用い、その表面に、電荷発生層と電荷輸送層を順大積層して積層型感光層を形成した電子写真感光体を製造した。電荷発生物質としてオキソチタニウムフタロシアニン0.5 重量部を用い、パインダー樹脂としてはブチラール樹脂0.5 重量部を用いた。これらを溶媒の塩化メチレン19重量部に加え、ボールミルにて分散し、この分散液をパーコーターにより、前配導電性基体フィルム表面に塗工し、乾燥させることにより、膜厚約0.5ミクロンの電荷発生層を形成した。

【0263】つぎに、電荷輸送物質として4ージベンジ ルアミノー2ーメチルペンズアルデヒドー1、1ージフ ェニルヒドラゾン0.5gを用い、パインダー樹脂とし て前配実旌例1の(1)で得られた炭素-炭素不飽和結 合を有するポリカーボネート樹脂 0. 5 g と、珪素化合 物として1、4-ビス (ジメチルシリル) ベンゼン0. 065gを用いた。これに、触媒として白金-シクロビ ニルメチルシロキサン錯体 0.002gのキシレン溶液 (白金濃度3.5重量%)と溶媒の塩化メチレン5ミリ リットルに加えて溶解させ、塗工液とした。この塗工液 をアプリケーターにより、上記電荷発生層の上に塗布 し、乾燥させた。つぎに、この塗膜に、120℃、常 圧、4時間の加熱処理を施し、塗膜中の炭素-炭素不飽 和結合を有するポリカーボネート樹脂の架構反応を行っ た。このようにして、塩化メチレン不溶成分(架橋ポリ カーボネート樹脂)を含有する厚さ約20ミクロンの電 荷輸送層を形成し、ひきつづいて120℃、1mmHg で12時間乾燥した。この電荷輸送層の形成の過程にお 30 いて、その登工液の塗布、乾燥、架橋に至るまで、ポリ カーボネート樹脂の結晶化による透明性の低下は見られ なかった。

【0264】ついで、このようにして得られた電子写真 感光体の電子写真特性の評価を行った。その評価試験装置としては、株式会社川口電機製作所製の静電気帯電試 酸装置EPA-8100を用い、-6kvでコロナ放電を行った際の初期表面電位、10ルックス光照射から5 秒後の残留電位、半波輝光量(E122)の測定を行った。これらの測定結果を第2表に示す。また、この電子 写真感光体の耐久性を評価するため、感光層の耐摩耗性試験を実施した。試験機としては、スガ試験機株式会社製のスガ摩耗試験機NUS-ISO-3型を用い、摩託試験の条件として、500gの荷重をかけた摩耗紙(粒径3μmのアルミナ粒子を含有)を感光層表面と接触させて2000回の往復運動を行い、重量減少量の測定をした。この結果を第2袋に示す。

【0265】実施例20~36

電荷輸送層のパインダー樹脂として、実施例2~18に 配載の炭素・炭素不飽和結合を有するポリカーボネート 50 樹脂と分子内に2つ以上の珪素・水素結合を持つ化合物 の組合せをそれぞれ使用した他は、いずれも実施例19 と同様にして、電子写真感光体を製造し評価した。これ ら評価結果を第2表に示す。

【0266】比較例4

導電性基体と電荷発生層の構成および電荷輸送層の電荷 輸送物質は実施例1と同一物質を同量で用い、電荷輸送 層のパインダー樹脂として、前記比較例1において製造 した未架橋ポリカーボネート樹脂 0.5 g および架橋剤 を記載頃にそれぞれ0.05g、0.005gを塩化メ を80 w/c m²の高圧水母灯による5秒間の照射とし た他は、実施例19と同様にして、電子写真感光体を製 造し評価した。その結果を第2表に示す。

【0267】比較例5

上記比較例4における架橋剤に代えてアゾビスイソプラ ロニトリル0.025gを用い、さらに架構条件を14 0℃、1時間とした他は、実施例19と同様にして、意 子写真感光体を製造し評価した。その結果を第2表に示 寸。

190

【0268】比較例6

電荷輸送層のパインダー樹脂として、1, 1-ビス (4 -ヒドロキシフェニル) シクロヘキサンを原料とするポ リカーボネート樹脂(還元粘度; 0. 77デシリットル チレン5ミリリットルに溶解して登工液とし、架橋条件 10 /g)を使用した他は、実施例19と同様にして、電子 写真感光体を製造し評価をした。その結果を第2表に示

> [0269] 【表3】

第2表(1)

| | 初期表面毛位 (V) | 安留電位 (V) | 底實(半接光量) (Lux·cm) | 序程量 (mg) |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 突旋列19 | -751 | -3 | 0.75 | 0. 7 |
| 実施例20 | -749 | - 2 | D. 73 | 0. 5 |
| 実施例21 | -752 | - 4 | 0.77 | 0. 6 |
| 実施列22 | -739 | -3 | 0.76 | 0. 6 |
| 美热到23 | -754 | -2 | 0.74 | 0. 6 |
| 实施列24 | -755 | - 3 | 0.76 | 1. 0 |
| 実施列 2 5 | -753 | -3 | 0.78 | 1. 1 |
| 卖性列26 | -739 | - 6 | 0. 7 B | 0. 8 |
| 実施列27 | -762 | -4 | 0. 75 | 0. 7 |
| 実施與28 | -755 | -5 | D. 78 | 0. 6 |
| 実施列29 | -748 | - 4 | 0, 77 | 1. 0 |
| 突旋列30 | -742 | -4 | 0.74 | 0. 6 |
| 実施例 3 1 | -762 | - 4 | 0.74 | 0. 7 |
| 美趣到32 | -757 | – 3 | 0.78 | 0, 8 |

[0270]

【袋4】

第2丧(2)

| | 初期表面電位 (V) | 残留電位 (V) | 配定(半済政光型) (Lux・cm) | (加度) |
|----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------|
| 美紀 3 3 | -760 | -5 | 0.76 | 0.8 |
| 実性例3 4 | -75i | -5 | 0.76 | . 0. 8 |
| 実施 列3 5 | -743 | - 2 | 0.79 | 1. 0 |
| 実施列36 | -747 | - 3 | 0. 77 | 0. 7 |
| 出较到 4 | -657 | -33 | 1. 43 | 1. 8 |
| 比較到 5 | -621 | -53 | 1. 66 | 1. 5 |
| 比较到 6 | -764 | - 3 | 0.85 | 2. 0 |

[0271]

機器、自動車部品、コート材、塗料などの分野において 有用性の高い架構ポリカーボネート樹脂を、架橋工程に おいてポリカーボネート樹脂の劣化を招く分子切断や化 学変化を伴うことのない、分子内に2つ以上の珪素-水 素結合を有する珪素化合物によるポリカーボネート樹脂 中の炭素一炭素不飽和結合のヒドロシリル化により架橋

することによって、光学的性質および機械的性質とくに 【発明の効果】本発明の方法によれば、電気機器や電子 20 耐摩託性に優れた架橋ポリカーボネート樹脂を製造する ことができる。

> 【0272】また、本発明の電子写真感光体は、感光層 のバインダー樹脂として上記架橋ポリカーボネート樹脂 を用いていることから、とくに感光層表面の耐摩耗性が 向上し、耐久性に優れている。